

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-156549

(P2020-156549A)

(43) 公開日 令和2年10月1日(2020.10.1)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01)	A 6 3 F 7/02 3 0 1 C	2 C 0 8 8
	A 6 3 F 7/02 3 2 6 C	

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 35 頁)

(21) 出願番号 特願2019-55941 (P2019-55941)
 (22) 出願日 平成31年3月25日 (2019. 3. 25)

(71) 出願人 390031783
 サミー株式会社
 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不
 動産大崎ガーデンタワー
 (74) 代理人 100092897
 弁理士 大西 正悟
 (74) 代理人 100157417
 弁理士 並木 敏章
 (72) 発明者 一関 広幸
 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不
 動産大崎ガーデンタワー サミー株式会
 社 内

最終頁に続く

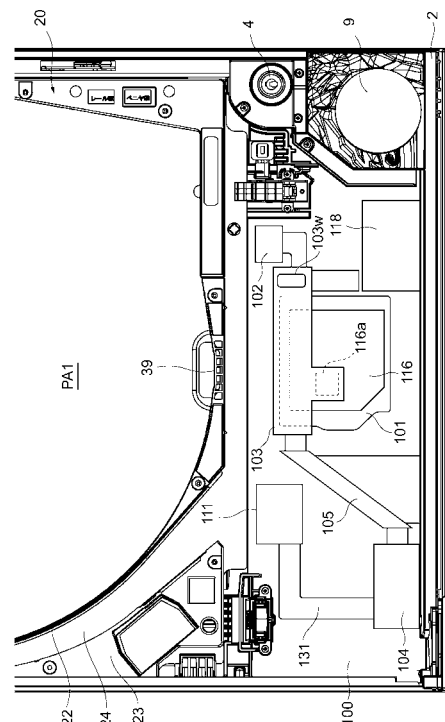
(54) 【発明の名称】 弾球遊技機

(57) 【要約】

【課題】内部構造を簡素化することが可能な封入循環式のぱちんこ遊技機を提供する。

【解決手段】ぱちんこ遊技機は、遊技盤20の下方で遊技球収容部103よりも下側に設けられ、ファール球回収口111に落入した遊技球が収容されるファール球収容部104と、ファール球収容部104に収容された遊技球を遊技球収容部103に送る移送装置105とを備えている。

【選択図】図5



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

前面側に、遊技球が入球可能な入賞口および前記入賞口に入球できなかった遊技球が通過するアウト口を有する遊技領域が設けられた遊技盤と、

前記遊技盤の下方に設けられて遊技球を収容する遊技球収容部と、

前記遊技盤の下方に設けられ、前記遊技球収容部に収容された遊技球を前記遊技領域に向けて打ち出す発射機構と、

前記遊技盤の後面側から前記遊技盤の下方へ延びて設けられ、前記入賞口に入球するか前記アウト口を通過して前記遊技盤の後面側に達した遊技球を流下させる循環通路部と、

前記遊技盤の下方に設けられ、前記循環通路部を流下する遊技球を研磨して前記遊技球収容部へ戻るように流下させる研磨部とを備えた封入循環式の弾球遊技機であって、

前記遊技盤に、前記発射機構により打ち出された遊技球を前記遊技領域に導く飛送レールが設けられ、

前記発射機構と前記飛送レールとの間に、前記発射機構により打ち出されて前記遊技領域に到達しなかった遊技球が落入するファール球回収口が設けられており、

前記遊技盤の下方で前記遊技球収容部よりも下側に設けられ、前記ファール球回収口に落入した遊技球が収容されるファール球収容部と、

前記ファール球収容部に収容された遊技球を前記遊技球収容部に送る移送装置とを備えることを特徴とする弾球遊技機。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、封入循環式の弾球遊技機に関する。

【背景技術】**【0002】**

弾球遊技機の一つであるぱちんこ遊技機は、遊技球による遊技を行う遊技領域が設けられた遊技盤を保持する枠部材に、払出装置および各種制御基板が装着された裏機構盤が取り付けられて構成される。そして、発射機構により遊技領域の上側に打ち出した遊技球を落下させる過程で、遊技領域内に設けた各種の入賞装置に入賞させる遊技が行われる。遊技球が入賞装置に入賞すると、この入賞に応じて所定の数の遊技球が賞球として球皿に払い出される。

【0003】

近年、遊技者側において遊技球を扱う必要をなくす形式の弾球遊技機、例えば、封入循環式のぱちんこ遊技機が考案されている（例えば、特許文献1を参照）。このような封入循環式のぱちんこ遊技機では、残高情報（遊技者が遊技できる遊技球の数）が記録されたカードを、ぱちんこ遊技機と外部接続されたカードリーダーライタに接続する。そして、カードに記録されている残高情報をクレジット（持ち球）に変換して、ぱちんこ遊技機内に封入された所定の数の遊技球を当該クレジット数に対応する数だけ遊技領域内に打ち出すことが可能である。なお、封入循環式のぱちんこ遊技機は、上記の球皿等に代えて、遊技領域から回収通路を介して戻された遊技済みの遊技球が貯留される貯留部と、貯留部に貯留された遊技球を上昇させて発射機構に送る移送装置とを備えている。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0004】**

【特許文献1】特開2018-15621号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

しかしながら、封入循環式のぱちんこ遊技機では、移送装置に係わる球通路の構成が複雑になりやすく、移送装置の大型化を招いていた。

10

20

30

40

50

【 0 0 0 6 】

本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、内部構造を簡素化することが可能な封入循環式の弾球遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 7 】

このような目的達成のため、本発明に係る弾球遊技機は、前面側に、遊技球が入球可能な入賞口および前記入賞口に入球できなかった遊技球が通過するアウト口を有する遊技領域が設けられた遊技盤と、前記遊技盤の下方に設けられて遊技球を収容する遊技球収容部と、前記遊技盤の下方に設けられ、前記遊技球収容部に収容された遊技球を前記遊技領域に向けて打ち出す発射機構と、前記遊技盤の後面側から前記遊技盤の下方へ延びて設けられ、前記入賞口に入球するか前記アウト口を通過して前記遊技盤の後面側に達した遊技球を流下させる循環通路部と、前記遊技盤の下方に設けられ、前記循環通路部を流下する遊技球を研磨して前記遊技球収容部へ戻るように流下させる研磨部とを備えた封入循環式の弾球遊技機（例えば、実施形態におけるぱちんこ遊技機 P M 1）であって、前記遊技盤に、前記発射機構により打ち出された遊技球を前記遊技領域に導く飛送レールが設けられ、前記発射機構と前記飛送レールとの間に、前記発射機構により打ち出されて前記遊技領域に到達しなかった遊技球が落入するファール球回収口が設けられており、前記遊技盤の下方で前記遊技球収容部よりも下側に設けられ、前記ファール球回収口に落入した遊技球が収容されるファール球収容部と、前記ファール球収容部に収容された遊技球を前記遊技球収容部に送る移送装置とを備えている。

【発明の効果】

【 0 0 0 8 】

本発明によれば、封入循環式の弾球遊技機の内部構造を簡素化することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 0 9 】

【図 1】第 1 実施形態に係るぱちんこ遊技機の正面図である。

【図 2】遊技盤を示す正面図である。

【図 3】ガラス枠の下部を示す平面図である。

【図 4】ガラス枠の下部における遊技球数表示装置の近傍を示す拡大斜視図である。

【図 5】第 1 実施形態に係る遊技補助領域を示す正面図である。

【図 6】第 1 実施形態に係るぱちんこ遊技機の各通路部を示す模式図である。

【図 7】磁性体除去部を示す概略構成図である。

【図 8】アウト口通路シャッターを示す概略構成図である。

【図 9】変形例に係る遊技補助領域を示す正面図である。

【図 10】変形例に係るぱちんこ遊技機の各通路部を示す模式図である。

【図 11】第 2 実施形態に係るぱちんこ遊技機の正面図である。

【図 12】遊技盤を示す正面図である。

【図 13】第 2 実施形態に係るぱちんこ遊技機の背面図である。

【図 14】ガラス枠の下部を示す平面図である。

【図 15】ガラス枠の下部における遊技球数表示装置の近傍を示す拡大斜視図である。

【図 16】第 2 実施形態に係る遊技補助領域を示す正面図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 0 】

〔第 1 実施形態〕

弾球遊技機の第 1 実施形態について説明する。本発明の実施形態として、第 1 実施形態に係る弾球遊技機を適用した封入循環式のぱちんこ遊技機（管理遊技機）P M 1 を図 1 に示すとともに、このぱちんこ遊技機 P M 1 に設けられる遊技盤 20 を図 2 に示しており、まず、これらの図を参照してぱちんこ遊技機 P M 1 の全体構成について説明する。なお、以降の説明においては、便宜上、図 1 の各矢印で示す方向をそれぞれ、前後方向、左右方向、上下方向と称して説明する。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 1 】

〔 遊技機の全体構成 〕

封入循環式のぱちんこ遊技機 P M 1 は、図 1 に示すように、外郭方形枠サイズに構成された縦向きの固定保持枠をなす外枠 1 と、これに合わせた方形枠サイズに構成されて開閉搭載枠をなす前枠 2 とを主体に構成される。前枠 2 は、外枠 1 および前枠 2 の左側縁部に配設された上下のヒンジ機構 3 a , 3 b により、外枠 1 の前側開口部に対して横開き開閉および着脱が可能に取り付けられる。また、前枠 2 は、右側縁部に設けられたダブル錠と称される施錠装置 4 を利用して、常には外枠 1 と係合連結された閉鎖状態に保持される。

【 0 0 1 2 】

前枠 2 には、この前枠 2 の上部前面域に合わせた方形状のガラス枠 5 が上下のヒンジ機構 3 a , 3 b を利用して横開き開閉および着脱可能に組み付けられる。ガラス枠 5 は、上述の施錠装置 4 を利用して、常には前枠 2 の前面を覆う閉鎖状態に保持される。前枠 2 の前面側には、遊技盤 2 0 が着脱可能にセット保持され、常には閉鎖保持されるガラス枠 5 の複層ガラス 5 a を通して遊技盤 2 0 の正面の遊技領域 P A 1 を視認可能に臨ませるようになっている。

10

【 0 0 1 3 】

ガラス枠 5 の上部には、遊技の展開状況に応じて発光する演出ランプ 7 や、遊技の展開状況に応じて効果音を発生させるスピーカ 8 が設けられている。ガラス枠 5 の下部には、複層ガラス 5 a よりも前方に突出して膨らむ膨出部 1 6 (図 3 も参照) が形成され、この膨出部 1 6 の中央に、所定の演出操作を行うためのボタンやスイッチ、ダイヤル等の演出ボタンユニット 1 1 が取り付けられる。

20

【 0 0 1 4 】

前枠 2 の右下部には、遊技球の発射操作を行う発射ハンドル 9 が設けられている。前枠 2 の下部におけるガラス枠 5 の後側の領域には、遊技球を遊技領域 P A 1 へ向けて打ち出す発射機構 1 0 1 等が設けられる遊技補助領域 1 0 0 (図 5 を参照) が形成されている。なお、遊技補助領域 1 0 0 の詳細については後述する。

【 0 0 1 5 】

遊技盤 2 0 は、図 2 に示すように、板状のベース部材 2 1 と、ベース部材 2 1 の前面側に取り付けられた内レール部材 2 2 および外レール部材 2 3 とを有している。ベース部材 2 1 の前面に、左側の領域が内レール部材 2 2 に囲まれるとともに、上側および右側の領域が外レール部材 2 3 に囲まれた遊技領域 P A 1 が形成される。内レール部材 2 2 と外レール部材 2 3 との間に、発射機構 1 0 1 が設けられる側から遊技領域 P A 1 の上部へと繋がる発射通路 2 4 が形成される。遊技領域 P A 1 には、複数の釘 2 5 や風車 2 6 とともに、第 1 始動入賞装置 3 1、第 2 始動入賞装置 3 2、左側一般入賞装置 3 3、右側一般入賞装置 3 4、大入賞装置 3 5 等の各種入賞装置や、作動ゲート装置 3 6 が配設されている。また、遊技領域 P A 1 の略中央にセンター飾り 2 7 が配設される。ベース部材 2 1 の後面側に、画像表示装置 2 8 および上下の可動演出装置 2 9 , 3 0 等が取り付けられ、センター飾り 2 7 の開口部分を通じて、画像表示装置 2 8 の画面および上下の可動演出装置 2 9 , 3 0 の前面側を前方から視認可能に構成されている。

30

【 0 0 1 6 】

遊技領域 P A 1 の下端部には、各種入賞装置 3 1 ~ 3 5 の入賞口に入球せずに流下した遊技球が通過可能なアウト口 3 9 が設けられている。各種入賞装置 3 1 ~ 3 5 の入賞口に入球した遊技球又はアウト口 3 9 に流入した遊技球は、遊技盤 2 0 に前後貫通して形成された貫通孔 (図示せず) を通じて遊技盤 2 0 の後面側へ流下し、遊技盤 2 0 の後面側から下方に延びる各通路部を経て、発射機構 1 0 1 により打ち出される遊技球が収容される遊技球収容部 1 0 3 (図 5 を参照) に戻される。

40

【 0 0 1 7 】

遊技盤 2 0 の後側には、ぱちんこ遊技機 P M 1 の作動を統括的に制御する主制御基板 (図示せず) や、遊技展開に応じた画像表示、効果照明、効果音等の演出全般の制御を行う副制御基板 (図示せず) 等が取り付けられている。前枠 2 の後側には、遊技施設側から受

50

電して各種制御装置や電気・電子部品に電力を供給する電源基板（図示せず）等が取り付けられている。これらの制御装置とぱちんこ遊技機 P M 1 各部の電気・電子部品とがハーネス（コネクタケーブル）で接続されて、ぱちんこ遊技機 P M 1 が作動可能に構成されている。

【 0 0 1 8 】

また、図 1 に示すように、ぱちんこ遊技機 P M 1 には、これに隣接してカードユニット C U 1 が併設されている。カードユニット C U 1 は、ぱちんこ遊技機 P M 1 と双方向通信可能に構成されており、プリペイドカードや会員カード（以下、単に「カード」とも称する）を受け付けて、該カードの記録情報により特定される遊技者保有の有価価値（カード残高）を遊技に使用可能な遊技球数（持球数）に変換して、ぱちんこ遊技機 P M 1 に所定個数だけ封入されている遊技球を循環使用して遊技を行い得るようになっている。ぱちんこ遊技機 P M 1 では、遊技を行うのに必要な遊技価値（カード残高）は、カードユニット C U 1 および遊技機内に設けられた制御装置（遊技者の手で直接触れることが不可能な制御ソフト）による数値データのみによって管理される。カードユニット C U 1 には、現金たる紙幣を投入するための紙幣投入口 M N 1、会員カードやプリペイドカードを投入するためのカード投入口 C R 1、投入されたカードの読み取り・書き込み機能を有するカードリーダーライタ（図示せず）、カード残高を限度として球貸し動作を要求するための球貸しボタン R N 1 等が設けられている。

【 0 0 1 9 】

[遊技補助領域の構成]

次に、ガラス枠 5 の膨出部 1 6 および、この膨出部 1 6 に覆われる前枠 2 の遊技補助領域 1 0 0 について、図 3 ~ 図 5 を追加参照して説明する。膨出部 1 6 は、図 1 および図 3 に示すように、ガラス枠 5 の下部に、複層ガラス 5 a よりも前方に突出する半球状に形成される。前述したように、膨出部 1 6 の中央に、演出ボタンユニット 1 1 が取り付けられる。図 3 に示すように、膨出部 1 6 の上部における演出ボタンユニット 1 1 の周辺部に、水平面状に広がる平面部 1 7 が形成される。平面部 1 7 の右側に、演出に関する設定操作等を行うための十字キー 1 2 が設けられる。平面部 1 7 の左前側に、持球数に関する情報をカードに書き込む操作を行うための計数ボタン 1 3 が設けられる。計数ボタン 1 3 が操作されると、カードユニット C U 1 のカード投入口 C R 1 に投入されているカードに、遊技終了時（返却要求時）に確定した最終的な持球数が記憶され、このカード投入口 C R 1 から当該カードが排出される。

【 0 0 2 0 】

平面部 1 7 の左後側に、持球数に関する情報を表示可能な遊技球数表示装置 1 4 が設けられる。遊技球数表示装置 1 4 は、持球数に関する情報を 7 セグメント表示するものである。遊技球数表示装置 1 4 は、6 桁の数字等を表示可能な 7 セグメント L E D を用いて構成される。持球数に関する情報として、例えば、持球数を示す 6 桁までの数字を、情遊技球数表示装置 1 4 で表示することが可能である。また、図 4 に示すように、遊技球数表示装置 1 4 の表示面は、平面部 1 7 に対し傾斜して上前方を向くように配置される。これにより、遊技者は、遊技球数表示装置 1 4 の上前方から、遊技球数表示装置 1 4 に表示される持球数に関する情報を視認しやすくなる。

【 0 0 2 1 】

図 5 に示すように、前枠 2 の下部における膨出部 1 6 の後側の領域には、膨出部 1 6 に覆われた比較的広い内部空間を形成する遊技補助領域 1 0 0 が形成される。この遊技補助領域 1 0 0 に、発射機構 1 0 1 と、球送り機構 1 1 6 と、遊技球収容部 1 0 3 と、研磨部 1 0 2 と、ファール球収容部 1 0 4 と、移送装置 1 0 5 とが設けられる。

【 0 0 2 2 】

発射機構 1 0 1 は、遊技球を遊技領域 P A 1 へ向けて左上方に打ち出す。発射機構 1 0 1 と遊技盤 2 0 の外レール部材 2 3 との間に、発射機構 1 0 1 により打ち出されて遊技領域 P A 1 に達しなかった遊技球が落入するファール球回収口 1 1 1 が設けられる。ファール球回収口 1 1 1 に落入した遊技球は、ファール球回収通路部 1 3 1 を流下してファール

10

20

30

40

50

球収容部 104 の内部に流入する。

【0023】

球送り機構 116 は、発射機構 101 の前側に重なって配置される。球送り機構 116 は、遊技球収容部 103 に収容された遊技球を 1 球ずつ発射機構 101 へ送る。球送り機構 116 の前部に、遊技球収容部 103 の内部から流出した遊技球が球送り機構 116 の内部側へ通過する発射球入口 116a が設けられる。

【0024】

遊技球収容部 103 は、遊技盤 20 のアウト口 39 よりも下側で、球送り機構 116 の発射球入口 116a よりも上側に配置される。遊技球収容部 103 は、内部に遊技球を収容して停留させることが可能な密閉型のタンク状に形成される。遊技球収容部 103 の前部に、遊技球収容部 103 の内部を視認可能な視認窓 103w が設けられる。これにより、前枠 2 に対してガラス枠 5 を開いた状態で、ぱちんこ遊技機 PM1 の前方から視認窓 103w を介して遊技球収容部 103 の内部を視認することができる。そのため、遊技球収容部 103 の内部における遊技球の有無や、遊技球収容部 103 に収容された遊技球の溜まり具合を容易に確認することができる。

10

【0025】

なお、視認窓 103w は、遊技球収容部 103 の前部に、左右に並んで複数設けられるようにしてもよい。このようにすれば、前枠 2 に対してガラス枠 5 を開いた状態で、ぱちんこ遊技機 PM1 の前方側の複数の方向から視認窓 103w を介して遊技球収容部 103 の内部を視認することができる。そのため、遊技球収容部 103 の内部における遊技球の有無や、遊技球収容部 103 に収容された遊技球の溜まり具合をより容易に確認することができる。また、遊技球収容部 103 の内部を明るくする照明装置等を設ける必要もない。

20

【0026】

研磨部 102 は、遊技盤 20 のアウト口 39 よりも下側で、遊技球収容部 103 よりも上側に配置される。研磨部 102 は、各種入賞装置 31 ~ 35 の入賞口に入球するかアウト口 39 を通過した後、詳細は後述する各通路部を経て遊技球収容部 103 に戻る遊技球を研磨（洗浄）する。これにより、発射機構 101 によって遊技球が遊技領域 PA1 へ打ち出されるたびに、研磨部 102 で遊技球を研磨することが可能になり、常にきれいな遊技球を用いて遊技を行うことができる。

30

【0027】

ファール球収容部 104 は、遊技球収容部 103 および、球送り機構 116 の発射球入口 116a よりも下側に配置される。ファール球収容部 104 は、内部に遊技球を収容して停留させることが可能な密閉型のタンク状に形成される。移送装置 105 は、ファール球収容部 104 と遊技球収容部 103 との間に配置される。移送装置 105 は、ファール球収容部 104 に収容された遊技球を上昇させて遊技球収容部 103 に送る。

【0028】

また、遊技補助領域 100 における遊技球収容部 103 よりも下側の部分に、遊技球収容部 103 等から排出された遊技球が貯留される回収箱 118 が着脱可能に取り付けられる。これにより、遊技球収容部 103 等から排出された遊技球を容易に回収することができる。

40

【0029】

[各通路部の構成]

次に、遊技球が流下する各通路部の構成について、図 6 ~ 8 を追加参照して説明する。なお、第 1 実施形態において、遊技球は、オーステナイト系ステンレスを用いて形成される。このように、非磁性体の遊技球を用いることで、磁石を用いた遊技球に対する不正行為を防止することができる。

【0030】

図 6 に示すように、遊技球収容部 103 の下側に、球送り機構 116 の発射球入口 116a と遊技球収容部 103 とに繋がる球送り通路部 127 が設けられる。球送り通路部 1

50

27は、遊技球収容部103の内部から流出した遊技球を一系列で発射球入口116aへ流下させる。球送り通路部127に、発射球カウントセンサ145が設けられる。発射球カウントセンサ145は、例えば光学センサ等を用いて構成され、遊技球収容部103の内部から流出して球送り通路部127を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。

【0031】

遊技盤20の後面側に、アウト口39に繋がるアウト口回収通路部121が設けられる。アウト口回収通路部121は、アウト口39を通過して遊技盤20の後面側に達した遊技球を集めて遊技盤20の下方へ流下させる。アウト口回収通路部121における遊技球が一系列で流下する部分に、アウト口カウントセンサ141が設けられる。アウト口カウントセンサ141は、例えば光学センサ等を用いて構成され、アウト口回収通路部121を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。アウト口回収通路部121におけるアウト口カウントセンサ141の上流側近傍に、アウト口回収通路部121を開閉可能なアウト口通路シャッター161が設けられる。

【0032】

アウト口通路シャッター161は、図8（A）および図8（B）に示すように、アウト口回収通路部121を開閉可能な通路閉鎖部材161aと、バネ等の付勢手段（図示せず）と、通路閉鎖部材161aを駆動する駆動部161bとを有している。通路閉鎖部材161aは、薄い平板状に形成され、アウト口回収通路部121を開通する開通位置（図8（A）を参照）と、アウト口回収通路部121を閉塞する不通位置（図8（B）を参照）との間で往復移動することができるようになっている。バネ等の付勢手段は、通路閉鎖部材161aが不通位置に移動するように付勢力を加える。駆動部161bは、例えばソレノイド等を用いて構成され、付勢手段の付勢力に抗して通路閉鎖部材161aを不通位置から開通位置へ移動させることができるようになっている。

【0033】

これにより、ぱちんこ遊技機PM1が電源オンの状態のとき、図8（A）に示すように、アウト口通路シャッター161は、アウト口回収通路部121を開通して、アウト口回収通路部121を流下する遊技球Bがアウト口カウントセンサ141を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機PM1が電源オフの状態のとき、図8（B）に示すように、アウト口通路シャッター161は、アウト口回収通路部121を不通にして、アウト口回収通路部121を流下する遊技球Bがアウト口カウントセンサ141を通過することを規制する。

【0034】

図6に示すように、遊技盤20の後面側に、各種入賞装置31～35の入賞口38に繋がる入賞口回収通路部122が設けられる。入賞口回収通路部122は、各種入賞装置31～35の入賞口38を通過して遊技盤20の後面側に達した遊技球を集めて遊技盤20の下方へ流下させる。入賞口回収通路部122における遊技球が一系列で流下する部分に、入賞口カウントセンサ142が設けられる。入賞口カウントセンサ142は、例えば光学センサ等を用いて構成され、入賞口回収通路部122を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。入賞口回収通路部122における入賞口カウントセンサ142の上流側近傍に、入賞口回収通路部122を開閉可能な入賞口通路シャッター162が設けられる。

【0035】

入賞口通路シャッター162は、アウト口通路シャッター161と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機PM1が電源オンの状態のとき、入賞口通路シャッター162は、入賞口回収通路部122を開通して、入賞口回収通路部122を流下する遊技球が入賞口カウントセンサ142を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機PM1が電源オフの状態のとき、入賞口通路シャッター162は、入賞口回収通路部122を不通にして、入賞口回収通路部122を流下する遊技球が入賞口カウントセンサ142を通過することを規制する。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 6 】

遊技盤 2 0 の下方に、アウト口回収通路部 1 2 1 と入賞口回収通路部 1 2 2 との合流部（下流端部）に繋がる第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 が設けられる。第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 は、アウト口回収通路部 1 2 1 もしくは入賞口回収通路部 1 2 2 を通過した遊技球を研磨部 1 0 2 へ流下させる。第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の中間部に、磁性体除去部 1 0 6 が設けられる。

【 0 0 3 7 】

磁性体除去部 1 0 6 は、図 7 (A) および図 7 (B) に示すように、電磁石ユニット 1 0 7 を用いて構成される。電磁石ユニット 1 0 7 は、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の中間部上側に突出して設けられた磁性体受容部 1 2 3 a に取り付けられる。図 7 (A) に示すように、電磁石ユニット 1 0 7 は、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を流下する非磁性体の（正規の）遊技球 B をそのまま通過させるが、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を流下する磁性体の（非正規の）遊技球 B m を磁力により上方へ引き付ける。そして、電磁石ユニット 1 0 7 は、単数もしくは複数の磁性体の遊技球 B m を磁性体受容部 1 2 3 a で吸着保持することができるようになっている。これにより、磁性体の遊技球 B m のみを第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 で流下することを規制可能であるため、非磁性体の遊技球 B に磁性体の遊技球 B m を混入させて行われる磁石を用いた不正行為を防止することができる。

【 0 0 3 8 】

磁性体受容部 1 2 3 a は、透明の樹脂材料等を用いて、磁性体受容部 1 2 3 a および第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の内側を視認可能に形成される。電磁石ユニット 1 0 7 が取り付けられた磁性体受容部 1 2 3 a は、ぱちんこ遊技機 P M 1（電磁石ユニット 1 0 7）が電源オンの状態でも、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 に対して着脱させることができるようになっている。これにより、磁性体の遊技球 B m が電磁石ユニット 1 0 7 により磁性体受容部 1 2 3 a で吸着保持されているか否かを確認することができる。そして、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 に対して離脱させた磁性体受容部 1 2 3 a から磁性体の遊技球 B m を取り除くようにすれば、磁性体の遊技球 B m を第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 から排除することができる。

【 0 0 3 9 】

図 6 に示すように、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 における磁性体除去部 1 0 6 の下流側に、磁性体通路切替部 1 0 8 が設けられる。磁性体通路切替部 1 0 8 は、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を流下して磁性体通路切替部 1 0 8 に達した遊技球を、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の下流部と磁性体排出通路部 1 2 8 のうちいずれか一方へ選択的に導くことができるようになっている。

【 0 0 4 0 】

例えば、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフの状態のとき、磁性体通路切替部 1 0 8 は、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を流下して磁性体通路切替部 1 0 8 に達した遊技球を磁性体排出通路部 1 2 8 へ導く。磁性体通路切替部 1 0 8 により磁性体排出通路部 1 2 8 へ導かれた遊技球は、磁性体排出通路部 1 2 8 を流下して各通路部（第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 等）の外部側に排出され、回収箱 1 1 8 に貯留される。このとき、磁性体通路切替部 1 0 8 に達する遊技球の殆どは、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オンの状態のときに電磁石ユニット 1 0 7 により磁性体受容部 1 2 3 a で吸着保持され、ぱちんこ遊技機 P M 1（電磁石ユニット 1 0 7）が電源オフの状態になることで、磁性体受容部 1 2 3 a から第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 に落下して戻った磁性体の遊技球 B m である。これにより、磁性体の遊技球 B m を容易に各通路部の外部側に排出することができる。

【 0 0 4 1 】

一方、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オンの状態のとき、磁性体通路切替部 1 0 8 は、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を流下して磁性体通路切替部 1 0 8 に達した遊技球を第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の下流部へ導く。磁性体通路切替部 1 0 8 により第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の下流部へ導かれた遊技球は、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の下流部を流下して、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の下流端に設けられた研磨通路切替部 1 0 9 に

10

20

30

40

50

達する。研磨通路切替部 109 は、第 1 遊技済球循環通路部 123 を流下して研磨通路切替部 109 に達した遊技球を、戻り通路部 124 と第 2 遊技済球循環通路部 125 のうちいずれか一方へ選択的に導くことができるようになっている。戻り通路部 124 は、研磨通路切替部 109 から導かれた遊技球を遊技球収容部 103 へ戻るように流下させる。

【0042】

第 2 遊技済球循環通路部 125 は、研磨通路切替部 109 から導かれた遊技球を一系列で研磨部 102 へ流下させる。第 2 遊技済球循環通路部 125 の下流側に、研磨前カウントセンサ 143 が設けられる。研磨前カウントセンサ 143 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。第 2 遊技済球循環通路部 125 における研磨前カウントセンサ 143 の上流側近傍に、第 2 遊技済球循環通路部 125 を開閉可能な研磨前シャッター 163 が設けられる。

10

【0043】

研磨前シャッター 163 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、研磨前シャッター 163 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を開通して、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 143 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、研磨前シャッター 163 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を不通にして、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 143 を通過することを規制する。

20

【0044】

研磨部 102 と遊技球収容部 103 との間に、研磨後流入通路部 126 が設けられる。研磨後流入通路部 126 は、研磨部 102 により研磨（洗浄）された遊技球を遊技球収容部 103 へ戻るように流下させる。研磨後流入通路部 126 の下流側に、研磨後流入カウントセンサ 144 が設けられる。研磨後流入カウントセンサ 144 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、研磨後流入通路部 126 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。研磨後流入通路部 126 における研磨後流入カウントセンサ 144 の上流側近傍に、研磨後流入通路部 126 を開閉可能な研磨後流入シャッター 164 が設けられる。

30

【0045】

研磨後流入シャッター 164 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、研磨後流入シャッター 164 は、研磨後流入通路部 126 を開通して、研磨後流入通路部 126 を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ 144 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、研磨後流入シャッター 164 は、研磨後流入通路部 126 を不通にして、研磨後流入通路部 126 を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ 144 を通過することを規制する。

【0046】

遊技補助領域 100 におけるファール球収容部 104 の上方に、ファール球回収口 111 と繋がるファール球回収通路部 131 が設けられる。ファール球回収通路部 131 は、ファール球回収口 111 に落入した遊技球を集めてファール球収容部 104 へ流下させる。ファール球回収通路部 131 における遊技球が一系列で流下する部分に、ファール球流入カウントセンサ 151 が設けられる。ファール球流入カウントセンサ 151 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、ファール球回収通路部 131 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。ファール球回収通路部 131 におけるファール球流入カウントセンサ 151 の上流側近傍に、ファール球回収通路部 131 を開閉可能なファール球流入シャッター 171 が設けられる。

40

【0047】

ファール球流入シャッター 171 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、ファール球流入シャッター

50

ー 171 は、ファール球回収通路部 131 を開通して、ファール球回収通路部 131 を流下する遊技球がファール球流入カウントセンサ 151 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、ファール球流入シャッター 171 は、ファール球回収通路部 131 を不通にして、ファール球回収通路部 131 を流下する遊技球がファール球流入カウントセンサ 151 を通過することを規制する。

【0048】

ファール球収容部 104 の下部に、移送装置 105 の下部とファール球収容部 104 とに繋がるファール球循環通路部 132 が設けられる。ファール球循環通路部 132 は、ファール球収容部 104 の内部から流出した遊技球を一系列で移送装置 105 の下部へ流下させる。ファール球循環通路部 132 に、移送前カウントセンサ 152 が設けられる。移送前カウントセンサ 152 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、ファール球循環通路部 132 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。ファール球循環通路部 132 における移送前カウントセンサ 152 の上流側近傍に、ファール球循環通路部 132 を開閉可能な移送前シャッター 172 が設けられる。

【0049】

移送前シャッター 172 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、移送前シャッター 172 は、ファール球循環通路部 132 を開通して、ファール球循環通路部 132 を流下する遊技球が移送前カウントセンサ 152 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、移送前シャッター 172 は、ファール球循環通路部 132 を不通にして、ファール球循環通路部 132 を流下する遊技球が移送前カウントセンサ 152 を通過することを規制する。

【0050】

移送装置 105 の上部と遊技球収容部 103 との間に、移送後流入通路部 133 が設けられる。移送後流入通路部 133 は、移送装置 105 から送られた遊技球を遊技球収容部 103 へ戻るように流下させる。移送後流入通路部 133 の下流側に、移送後流入カウントセンサ 153 が設けられる。移送後流入カウントセンサ 153 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、移送後流入通路部 133 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。移送後流入通路部 133 における移送後流入カウントセンサ 153 の上流側近傍に、移送後流入通路部 133 を開閉可能な移送後流入シャッター 173 が設けられる。

【0051】

移送後流入シャッター 173 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、移送後流入シャッター 173 は、移送後流入通路部 133 を開通して、移送後流入通路部 133 を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ 153 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、移送後流入シャッター 173 は、移送後流入通路部 133 を不通にして、移送後流入通路部 133 を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ 153 を通過することを規制する。

【0052】

なお、遊技球収容部 103 の下側に、球抜き装置（図示せず）と、遊技球排出通路部 129 とが設けられる。球抜き装置は、所定の操作によって、遊技球収容部 103 に収容された遊技球を遊技球排出通路部 129 に流出させることができるようになっている。また、遊技球排出通路部 129 の中間部と遊技球収容部 103 との間に、オーバーフロー通路部 130 が形成される。オーバーフロー通路部 130 は、遊技球収容部 103 が遊技球で満杯になった場合に、遊技球収容部 103 で収容しきれない遊技球を遊技球排出通路部 129 へ流下させる。これにより、遊技球収容部 103 の内部に余剰な数の遊技球が流入して、遊技球収容部 103 の内部での遊技球の詰まりや、遊技球収容部 103 の破損が生じることが防止することができる。

【0053】

球抜き装置（図示せず）もしくはオーバーフロー通路部 130 を介して、遊技球収容部 103 の内部から遊技球排出通路部 129 に流出した遊技球は、遊技球排出通路部 129 を流下して遊技球収容部 103 の外部側に排出され、回収箱 118 に貯留される。遊技球排出通路部 129 の下流側に、遊技球排出カウントセンサ 147 が設けられる。遊技球排出カウントセンサ 147 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、遊技球排出通路部 129 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。遊技球排出通路部 129 における遊技球排出カウントセンサ 147 の上流側近傍に、遊技球排出シャッター 167 が設けられる。

【0054】

遊技球排出シャッター 167 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、遊技球排出シャッター 167 は、遊技球排出通路部 129 を開通して、遊技球排出通路部 129 を流下する遊技球が遊技球排出カウントセンサ 147 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、遊技球排出シャッター 167 は、遊技球排出通路部 129 を不通にして、遊技球排出通路部 129 を流下する遊技球が遊技球排出カウントセンサ 147 を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態の場合にのみ、遊技球収容部 103 に収容された遊技球を、遊技球収容部 103 の外部側に排出することができる。そのため、遊技球収容部 103 に収容された遊技球の一部が排出されても、遊技球収容部 103 に収容された残りの遊技球の数を検知することができる。

【0055】

また、図 6 の二点鎖線で示すように、ファール球収容部 104 に、球抜き装置（図示せず）と、ファール球排出通路部 134 とが設けられてもよい。球抜き装置は、所定の操作によって、ファール球収容部 104 に収容された遊技球をファール球排出通路部 134 に流出させることができるようになっている。球抜き装置を介して、ファール球収容部 104 の内部からファール球排出通路部 134 に流出した遊技球は、ファール球排出通路部 134 を流下してファール球収容部 104 の外部側に排出される。

【0056】

またこの場合、ファール球排出通路部 134 に、ファール球排出カウントセンサ 154 が設けられてもよい。ファール球排出通路部 134 におけるファール球排出カウントセンサ 154 の上流側近傍に、ファール球排出シャッター 174 が設けられてもよい。ファール球排出カウントセンサ 154 は、例えば光学センサ等を用いて構成され、ファール球排出通路部 134 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。ファール球排出シャッター 174 は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。すなわち、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オンの状態のとき、ファール球排出シャッター 174 は、ファール球排出通路部 134 を開通して、ファール球排出通路部 134 を流下する遊技球がファール球排出カウントセンサ 154 を通過することを可能にする。一方、ぱちんこ遊技機 PM1 が電源オフの状態のとき、ファール球排出シャッター 174 は、ファール球排出通路部 134 を不通にして、ファール球排出通路部 134 を流下する遊技球がファール球排出カウントセンサ 154 を通過することを規制する。

【0057】

以上のように構成される、封入循環式のぱちんこ遊技機 PM1 は、外枠 1 が遊技施設の遊技島（図示せず）に固定設置され、前枠 2、ガラス枠 5 等が閉鎖施錠された状態で遊技に供され、発射ハンドル 9 を回動操作することにより遊技が開始される。発射ハンドル 9 が回動操作されると、遊技球収容部 103 に収容された遊技球が、球送り機構 116 によって 1 球ずつ発射機構 101 に送り出され、当該発射機構 101 により遊技領域 PA1 に向けて打ち出される。

【0058】

このとき、球送り機構 116 の作動に応じて、遊技球収容部 103 に収容された遊技球が 1 球ずつ球送り通路部 127 に流出する。遊技球収容部 103 の内部から流出した遊技球は、球送り通路部 127 を流下して球送り機構 116 の発射球入口 116a を通る。発

10

20

30

40

50

射球カウントセンサ 145 は、遊技球収容部 103 の内部から流出して球送り通路部 127 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板に設けられた遊技球管理手段（図示せず）は、発射球カウントセンサ 145 から入力される検出信号に基づいて、遊技球収容部 103 の内部から流出する遊技球の数をカウントすることができる。

【0059】

遊技領域 PA1 を転動流下する遊技球が、各種入賞装置 31 ~ 35 のいずれかの入賞口 38 に入球すると、遊技盤 20 の貫通孔（図示せず）を通過して遊技盤 20 の後面側に達し、入賞口回収通路部 122 を流下する。入賞口カウントセンサ 142 は、入賞口回収通路部 122 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、入賞口カウントセンサ 142 から入力される検出信号に基づいて、各種入賞装置 31 ~ 35 の入賞口 38 に入球して遊技球収容部 103 に戻る遊技球の数をカウントすることができる。

10

【0060】

遊技領域 PA1 を転動流下する遊技球が、各種入賞装置 31 ~ 35 の入賞口 38 に入球できずに、アウト口 39 に流入すると、遊技盤 20 の貫通孔（図示せず）を通過して遊技盤 20 の後面側に達し、アウト口回収通路部 121 を流下する。アウト口カウントセンサ 141 は、アウト口回収通路部 121 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、アウト口カウントセンサ 141 から入力される検出信号に基づいて、アウト口 39 を通過して遊技球収容部 103 に戻る遊技球の数をカウントすることができる。

20

【0061】

アウト口回収通路部 121 もしくは入賞口回収通路部 122 を通過した遊技球は、第 1 遊技済球循環通路部 123 の上流部を流下して磁性体除去部 106 に達する。このとき、遊技球が非磁性体の（正規の）遊技球 B である場合、そのまま磁性体除去部 106 を通過することができる。一方、遊技球が磁性体の（非正規の）遊技球 Bm である場合、磁性体除去部 106 の電磁石ユニット 107 により磁性体受容部 123a で吸着保持される。磁性体除去部 106 を通過した遊技球は、磁性体通路切替部 108 を介して第 1 遊技済球循環通路部 123 の下流部を流下し、研磨通路切替部 109 に達する。

【0062】

研磨通路切替部 109 は、所定の非研磨状態の場合、第 1 遊技済球循環通路部 123 を流下して研磨通路切替部 109 に達した遊技球を、戻り通路部 124 へ導く。所定の非研磨状態には、研磨部 102 が異常を示す状態、特別遊技状態（大当り遊技状態）、遊技が開始されてから所定の経過時間が経過していない状態、遊技が開始されてから所定の数の遊技球が打ち出されていない状態等がある。研磨通路切替部 109 により戻り通路部 124 へ導かれた遊技球は、研磨部 102 を介さずに、戻り通路部 124 を流下して遊技球収容部 103 の内部に流入する。これにより、研磨部 102 が異常等により作動していても、遊技球を滞留させることなく遊技球収容部 103 へ戻すことができる。また、発射機構 101 により打ち出される遊技球が欠かせない特別遊技状態のときに、遊技球を短時間で遊技球収容部 103 へ戻すことができる。また、研磨部 102 による遊技球の研磨（洗浄）を適切なタイミングでのみ行うことができるため、研磨部 102 の作動時間を低減させて、ぱちんこ遊技機 PM1 の省電力化および低騒音化を図ることが可能になる。

30

40

【0063】

研磨通路切替部 109 は、所定の研磨状態の場合、第 1 遊技済球循環通路部 123 を流下して研磨通路切替部 109 に達した遊技球を、第 2 遊技済球循環通路部 125 へ導く。所定の研磨状態には、研磨部 102 が正常を示す状態、通常の遊技状態、遊技が開始されてから所定の経過時間が経過している状態、遊技が開始されてから所定の数以上の遊技球が打ち出された状態等がある。研磨通路切替部 109 により第 2 遊技済球循環通路部 125 へ導かれた遊技球は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下して研磨部 102 に達する。研磨前カウントセンサ 143 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球を検

50

出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、研磨前カウントセンサ１４３から入力される検出信号に基づいて、研磨部１０２に流入する遊技球の数をカウントすることができる。

【００６４】

研磨部１０２は、第２遊技済球循環通路部１２５から流入する遊技球を研磨（洗浄）して研磨後流入通路部１２６に送る。研磨部１０２により研磨された遊技球は、研磨後流入通路部１２６を流下して遊技球収容部１０３の内部に流入する。研磨後流入カウントセンサ１４４は、研磨後流入通路部１２６を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、研磨後流入カウントセンサ１４４から入力される検出信号に基づいて、各種入賞装置３１～３５の入賞口３８に入球するかアウト口３９を通過し、研磨部１０２により研磨されて遊技球収容部１０３に戻る遊技球の数をカウントすることができる。

【００６５】

また、主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、研磨後流入カウントセンサ１４４から入力される検出信号に基づいて、研磨部１０２から流出する遊技球の数をカウントすることができる。これにより、主制御基板の遊技球管理手段が、研磨前カウントセンサ１４３を用いて研磨部１０２に流入する遊技球の数をカウントし、研磨後流入カウントセンサ１４４を用いて研磨部１０２から流出する遊技球の数をカウントすることで、研磨部１０２に滞留する遊技球の数や、研磨部１０２に滞留する遊技球の滞留時間等を検知することができる。そのため、研磨部１０２における遊技球の詰まりや故障等のトラブルを早期に発見することが可能になる。

【００６６】

発射機構１０１により打ち出されて遊技領域ＰＡ１に達しなかった遊技球は、ファール球回収口１１１に落入する。ファール球回収口１１１に落入した遊技球は、ファール球回収通路部１３１を流下してファール球収容部１０４の内部に流入する。ファール球流入カウントセンサ１５１は、ファール球回収通路部１３１を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、ファール球流入カウントセンサ１５１から入力される検出信号に基づいて、ファール球収容部１０４に一時的に収容される遊技球の数をカウントすることができる。

【００６７】

ファール球収容部１０４に一時的に収容された遊技球は、ファール球循環通路部１３２に流出する。ファール球収容部１０４の内部から流出した遊技球は、ファール球循環通路部１３２を流下して移送装置１０５に達する。移送前カウントセンサ１５２は、ファール球循環通路部１３２を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、移送前カウントセンサ１５２から入力される検出信号に基づいて、ファール球収容部１０４の内部から流出する遊技球の数をカウントすることができる。

【００６８】

移送装置１０５は、ファール球循環通路部１３２から流入する遊技球を、ファール球循環通路部１３２よりも上方に配置された移送後流入通路部１３３まで上昇させて送る。移送装置１０５から送られた遊技球は、移送後流入通路部１３３を流下して遊技球収容部１０３の内部に流入する。移送後流入カウントセンサ１５３は、移送後流入通路部１３３を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、移送後流入カウントセンサ１５３から入力される検出信号に基づいて、ファール球回収口１１１に落入し、移送装置１０５により送られて遊技球収容部１０３に戻る遊技球の数をカウントすることができる。

【００６９】

以上で説明したように、各種入賞装置３１～３５の入賞口３８に入球するかアウト口３９を通過した遊技球は、重力の作用により第１遊技済球循環通路部１２３および第２遊技済球循環通路部１２５等を流下し、研磨部１０２により研磨されて遊技球収容部１０３に

戻る。ファール球回収口 1 1 1 に落入した遊技球は、ファール球収容部 1 0 4 に一時的に収容され、移送装置 1 0 5 により送られて遊技球収容部 1 0 3 に戻る。このように、本実施形態によれば、移送装置 1 0 5 がファール球収容部 1 0 4 に収容された遊技球のみを遊技球収容部 1 0 3 に送るように構成されるため、移送装置 1 0 5 の構造を単純にすることができ、移送装置 1 0 5 を小さくすることが可能になる。そのため、封入循環式のぱちんこ遊技機 P M 1 の下部（遊技補助領域 1 0 0 ）における内部構造を簡素化することが可能になる。

【 0 0 7 0 】

また、主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）が、発射球カウントセンサ 1 4 5 を用いて遊技球収容部 1 0 3 の内部から流出する遊技球の数をカウントし、アウト口カウントセンサ 1 4 1、入賞口カウントセンサ 1 4 2、研磨後流入カウントセンサ 1 4 4、および移送後流入カウントセンサ 1 5 3 を用いて遊技球収容部 1 0 3 の内部に流入する遊技球の数をカウントすることで、遊技球収容部 1 0 3 に収容され得る、すなわち、ぱちんこ遊技機 P M 1 の各通路部を循環する遊技球の数を検知することができる。これにより、例えば、ぱちんこ遊技機 P M 1 の初期設定時に、遊技球を外部からアウト口 3 9 に流入させて遊技球収容部 1 0 3 に補給することができる。このとき、主制御基板の遊技球管理手段が、アウト口カウントセンサ 1 4 1 を用いて遊技球収容部 1 0 3 の内部に流入する遊技球の数をカウントすることで、遊技球収容部 1 0 3 に補給された遊技球の数を検知することができる。

【 0 0 7 1 】

なおこの場合、初期設定時に限らず、遊技球を遊技球収容部 1 0 3 に補給可能な状態として遊技球補給モードを設定し、当該遊技球補給モードのときに遊技球を補給するようにしてもよい。また、アウト口カウントセンサ 1 4 1 に限らず、他のセンサ（例えば、研磨後流入カウントセンサ 1 4 4）を用いて遊技球収容部 1 0 3 の内部に流入する遊技球の数をカウントしてもよく、専用の補給カウントセンサを用いて遊技球収容部 1 0 3 の内部に流入する遊技球の数をカウントしてもよい。また、アウト口 3 9 に限らず、アウト口 3 9 や入賞口 3 8 等とは別に、遊技球を補給するための遊技球補給口を設けるようにしてもよい。

【 0 0 7 2 】

また例えば、遊技球収容部 1 0 3 の内部から流出する遊技球の数と、遊技球収容部 1 0 3 の内部に流入する遊技球の数と差が、所定の許容個数を超える場合に、不図示の報知手段を用いて異常を報知することが可能である。このような場合として、例えば、図 7（B）に示すように、電磁石ユニット 1 0 7 により磁性体受容部 1 2 3 a で吸着保持された、多数個の磁性体の遊技球 B m が第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を塞ぎ、遊技球が第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 等を流下して循環することが不可能になる場合等がある。

【 0 0 7 3 】

主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）が、ファール球流入カウントセンサ 1 5 1 を用いてファール球収容部 1 0 4 の内部に流入する遊技球の数をカウントし、移送前カウントセンサ 1 5 2 を用いてファール球収容部 1 0 4 の内部から流出する遊技球の数をカウントすることで、ファール球収容部 1 0 4 に一時的に収容される遊技球の数を検知することができる。これにより、移送装置 1 0 5 は、遊技球がファール球循環通路部 1 3 2 を流下してファール球収容部 1 0 4 に収容されたことをファール球流入カウントセンサ 1 5 1 が検出すると作動を開始し、ファール球収容部 1 0 4 から遊技球が無くなってから所定時間が経過すると、その作動を停止するようになっている。そのため、移送装置 1 0 5 を適切なタイミングでのみ作動させることができるため、移送装置 1 0 5 の作動時間を低減させて、ぱちんこ遊技機 P M 1 の省電力化および低騒音化を図ることが可能になる。また、移送装置 1 0 5 の故障を抑えることも期待できる。

【 0 0 7 4 】

ところで、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、電源処理の際、アウト口通路シャッター 1 6 1 は、アウト口カウントセンサ 1 4 1 による遊

10

20

30

40

50

技球の検出が無効になるまでの間に、アウト口回収通路部 1 2 1 を不通にして、アウト口回収通路部 1 2 1 を流下する遊技球がアウト口カウントセンサ 1 4 1 を通過することを規制する。同様の処理として、入賞口通路シャッター 1 6 2 は、入賞口カウントセンサ 1 4 2 による遊技球の検出が無効になるまでの間に、入賞口回収通路部 1 2 2 を不通にして、入賞口回収通路部 1 2 2 を流下する遊技球が入賞口カウントセンサ 1 4 2 を通過することを規制する。

【 0 0 7 5 】

研磨前シャッター 1 6 3 は、研磨前カウントセンサ 1 4 3 による遊技球の検出が無効になるまでの間に、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 を不通にして、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 1 4 3 を通過することを規制する。研磨後流入シャッター 1 6 4 は、研磨後流入カウントセンサ 1 4 4 による遊技球の検出が無効になるまでの間に、研磨後流入通路部 1 2 6 を不通にして、研磨後流入通路部 1 2 6 を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ 1 4 4 を通過することを規制する。

【 0 0 7 6 】

ファール球流入シャッター 1 7 1 は、ファール球流入カウントセンサ 1 5 1 による遊技球の検出が無効になるまでの間に、ファール球回収通路部 1 3 1 を不通にして、ファール球回収通路部 1 3 1 を流下する遊技球がファール球流入カウントセンサ 1 5 1 を通過することを規制する。移送前シャッター 1 7 2 は、移送前カウントセンサ 1 5 2 による遊技球の検出が無効になるまでの間に、ファール球循環通路部 1 3 2 を不通にして、ファール球循環通路部 1 3 2 を流下する遊技球が移送前カウントセンサ 1 5 2 を通過することを規制する。移送後流入シャッター 1 7 3 は、移送後流入カウントセンサ 1 5 3 による遊技球の検出が無効になるまでの間に、移送後流入通路部 1 3 3 を不通にして、移送後流入通路部 1 3 3 を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ 1 5 3 を通過することを規制する。

【 0 0 7 7 】

一方、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフの状態から電源オンの状態になる場合、電断復帰処理の際、アウト口通路シャッター 1 6 1 は、アウト口カウントセンサ 1 4 1 による遊技球の検出が有効になってから、アウト口回収通路部 1 2 1 を開通して、アウト口回収通路部 1 2 1 を流下する遊技球がアウト口カウントセンサ 1 4 1 を通過することを可能にする。同様の処理として、入賞口通路シャッター 1 6 2 は、入賞口カウントセンサ 1 4 2 による遊技球の検出が有効になってから、入賞口回収通路部 1 2 2 を開通して、入賞口回収通路部 1 2 2 を流下する遊技球が入賞口カウントセンサ 1 4 2 を通過することを可能にする。

【 0 0 7 8 】

研磨前シャッター 1 6 3 は、研磨前カウントセンサ 1 4 3 による遊技球の検出が有効になってから、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 を開通して、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 1 4 3 を通過することを可能にする。研磨後流入シャッター 1 6 4 は、研磨後流入カウントセンサ 1 4 4 による遊技球の検出が有効になってから、研磨後流入通路部 1 2 6 を開通して、研磨後流入通路部 1 2 6 を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ 1 4 4 を通過することを可能にする。

【 0 0 7 9 】

ファール球流入シャッター 1 7 1 は、ファール球流入カウントセンサ 1 5 1 による遊技球の検出が有効になってから、ファール球回収通路部 1 3 1 を開通して、ファール球回収通路部 1 3 1 を流下する遊技球がファール球流入カウントセンサ 1 5 1 を通過することを可能にする。移送前シャッター 1 7 2 は、移送前カウントセンサ 1 5 2 による遊技球の検出が有効になってから、ファール球循環通路部 1 3 2 を開通して、ファール球循環通路部 1 3 2 を流下する遊技球が移送前カウントセンサ 1 5 2 を通過することを可能にする。移送後流入シャッター 1 7 3 は、移送後流入カウントセンサ 1 5 3 による遊技球の検出が有効になってから、移送後流入通路部 1 3 3 を開通して、移送後流入通路部 1 3 3 を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ 1 5 3 を通過することを可能にする。

【 0 0 8 0 】

これにより、ぱちんこ遊技機 P M 1 が、電源オンの状態から一時的に電源オフの状態となり、再び電源オンの状態になっても、遊技球収容部 1 0 3 に収容され得る、すなわち、ぱちんこ遊技機 P M 1 の各通路部を循環する遊技球の数を、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフになる前の状態から継続的に検知することができる。また、研磨部 1 0 2 に滞留する遊技球の数や、ファール球収容部 1 0 4 に一時的に収容される遊技球の数を、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフになる前の状態から継続的に検知することができる。

【 0 0 8 1 】

また、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、研磨前シャッター 1 6 3 は、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 を不通にして、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 1 4 3 を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機 P M 1 を輸送する際に、第 2 遊技済球循環通路部 1 2 5 に残留していた遊技球が研磨部 1 0 2 に流入することに起因して、研磨部 1 0 2 の内部が破損することを防止することができる。

【 0 0 8 2 】

ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、研磨後流入シャッター 1 6 4 は、研磨後流入通路部 1 2 6 を不通にして、研磨後流入通路部 1 2 6 を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ 1 4 4 を通過することを規制する。移送後流入シャッター 1 7 3 は、移送後流入通路部 1 3 3 を不通にして、移送後流入通路部 1 3 3 を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ 1 5 3 を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機 P M 1 を輸送する際に、研磨後流入通路部 1 2 6 または移送後流入通路部 1 3 3 に残留していた遊技球が遊技球収容部 1 0 3 に流入することに起因して、遊技球収容部 1 0 3 の内部が破損することを防止することができる。

【 0 0 8 3 】

ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、ファール球流入シャッター 1 7 1 は、ファール球回収通路部 1 3 1 を不通にして、ファール球回収通路部 1 3 1 を流下する遊技球がファール球流入カウントセンサ 1 5 1 を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機 P M 1 を輸送する際に、ファール球回収通路部 1 3 1 に残留していた遊技球がファール球収容部 1 0 4 に流入することに起因して、ファール球収容部 1 0 4 の内部が破損することを防止することができる。

【 0 0 8 4 】

[第 1 実施形態における特徴構成]

第 1 実施形態において、ぱちんこ遊技機 P M 1 は、遊技盤 2 0 の下方で遊技球収容部 1 0 3 よりも下側に設けられ、ファール球回収口 1 1 1 に落入した遊技球が収容されるファール球収容部 1 0 4 と、ファール球収容部 1 0 4 に収容された遊技球を遊技球収容部 1 0 3 に送る移送装置 1 0 5 とを備えている。これにより、移送装置 1 0 5 がファール球収容部 1 0 4 に収容された遊技球のみを遊技球収容部 1 0 3 に送るように構成されるため、移送装置 1 0 5 の構造を単純にすることができ、移送装置 1 0 5 を小さくすることが可能になる。そのため、封入循環式のぱちんこ遊技機 P M 1 の下部（遊技補助領域 1 0 0 ）における内部構造を簡素化することが可能になる。

【 0 0 8 5 】

また、移送装置 1 0 5 は、遊技球がファール球収容部 1 0 4 に収容されたことをファール球流入カウントセンサ 1 5 1 が検出すると作動し、ファール球収容部 1 0 4 から遊技球が無くなると停止するようになっている。これにより、移送装置 1 0 5 を適切なタイミングでのみ作動させることができるため、移送装置 1 0 5 の作動時間を低減させて、ぱちんこ遊技機 P M 1 の省電力化および低騒音化を図ることが可能になる。また、移送装置 1 0 5 の故障を抑えることも期待できる。

【 0 0 8 6 】

第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 の下流端に、第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3 を流下する遊技球を研磨部 1 0 2 を介さずに遊技球収容部 1 0 3 へ戻すことが可能な研磨通路切替部 1 0 9 が設けられている。これにより、研磨部 1 0 2 が異常等により作動していなくても

10

20

30

40

50

、遊技球を滞留させることなく遊技球収容部 103 へ戻すことができる。また、発射機構 101 により打ち出される遊技球が欠かせない特別遊技状態のときに、遊技球を短時間で遊技球収容部 103 へ戻すことができる。また、研磨部 102 による遊技球の研磨（洗浄）を適切なタイミングでのみ行うことができるため、研磨部 102 の作動時間を低減させて、ぱちんこ遊技機 P M 1 の省電力化および低騒音化を図ることが可能になる。

【0087】

ぱちんこ遊技機 P M 1 は、遊技球収容部 103 から流出して球送り通路部 127 を流下する遊技球を検出する発射球カウントセンサ 145 と、研磨後流入通路部 126 を流下して遊技球収容部 103 に流入する遊技球を検出する研磨後流入カウントセンサ 144 と、移送後流入通路部 133 を流下して遊技球収容部 103 に流入する遊技球を検出する移送後流入カウントセンサ 153 とを備えている。これにより、発射球カウントセンサ 145 を利用して遊技球収容部 103 から流出する遊技球の数をカウントし、研磨後流入カウントセンサ 144 および移送後流入カウントセンサ 153 を利用して遊技球収容部 103 に流入する遊技球の数をカウントすることで、遊技球収容部 103 に収容され得る、すなわち、ぱちんこ遊技機 P M 1 の各通路部を循環する遊技球の数を検知することができる。

【0088】

また、研磨後流入通路部 126 における研磨後流入カウントセンサ 144 の上流側に、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフの状態のときに研磨後流入通路部 126 を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ 144 を通って遊技球収容部 103 に流入することを規制する研磨後流入シャッター 164 が設けられる。移送後流入通路部 133 における移送後流入カウントセンサ 153 の上流側に、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフの状態のときに移送後流入通路部 133 を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ 153 を通って遊技球収容部 103 に流入することを規制する移送後流入シャッター 173 が設けられる。これにより、ぱちんこ遊技機 P M 1 を輸送する際に、研磨後流入通路部 126 や移送後流入通路部 133 等に残留していた遊技球が、遊技球収容部 103 に流入することに起因して、遊技球収容部 103 の内部が破損することを防止することができる。また、ぱちんこ遊技機 P M 1 が、電源オンの状態から一時的に電源オフの状態となり、再び電源オンの状態になっても、遊技球収容部 103 に収容され得る、すなわち、ぱちんこ遊技機 P M 1 の各通路部を循環する遊技球の数を、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフになる前の状態から継続的に検知することができる。

【0089】

ぱちんこ遊技機 P M 1 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下して研磨部 102 に達する遊技球を検出する研磨前カウントセンサ 143 と、研磨部 102 により研磨されて研磨後流入通路部 126 を流下する遊技球を検出する研磨後流入カウントセンサ 144 とを備えている。これにより、研磨前カウントセンサ 143 を利用して研磨部 102 に流入する遊技球の数をカウントし、研磨後流入カウントセンサ 144 を利用して研磨部 102 から流出する遊技球の数をカウントすることで、研磨部 102 に滞留する遊技球の数や、研磨部 102 に滞留する遊技球の滞留時間等を検知することができる。そのため、研磨部 102 における遊技球の詰まりや故障等のトラブルを早期に発見することが可能になる。

【0090】

また、第 2 遊技済球循環通路部 125 における研磨前カウントセンサ 143 の上流側に、ぱちんこ遊技機 P M 1 が電源オフの状態のときに第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 143 を通って研磨部 102 に達することを規制する研磨前シャッター 163 が設けられる。これにより、ぱちんこ遊技機 P M 1 を輸送する際に、第 2 遊技済球循環通路部 125 等に残留していた遊技球が、研磨部 102 に流入することに起因して、研磨部 102 の内部が破損することを防止することができる。

【0091】

[第 1 実施形態の変形例]

上述の第 1 実施形態において、研磨部 102 は、遊技盤 20 のアウト口 39 よりも下側で、遊技球収容部 103 よりも上側に配置されているが、これに限られるものではない。

例えば、図 9 および図 10 に示すように、研磨部 202 が、遊技補助領域 200 における遊技球収容部 103 よりも下側に配置されてもよい。

【0092】

なおこの場合、研磨部 202 とファール球収容部 104 との間に、研磨後流入通路部 226 が設けられる。研磨後流入通路部 226 は、研磨部 202 により研磨（洗浄）された遊技球をファール球収容部 104 へ流下させる。研磨後流入通路部 226 の下流側に、研磨後流入カウントセンサ 244 が設けられる。研磨後流入カウントセンサ 244 は、第 1 実施形態の研磨後流入カウントセンサ 144 と同様に構成される。研磨後流入通路部 226 における研磨後流入カウントセンサ 244 の上流側近傍に、研磨後流入通路部 226 を開閉可能な研磨後流入シャッター 264 が設けられる。研磨後流入シャッター 264 は、第 1 実施形態の研磨後流入シャッター 164 と同様に構成される。

10

【0093】

またこの場合、図 10 の破線で示すように、遊技球収容部 103 の下部に、研磨部 202 と遊技球収容部 103 とに繋がる循環研磨用通路部 235 が設けられる。循環研磨用通路部 235 は、遊技球収容部 103 の内部から流出した遊技球を一系列で研磨部 202 へ流下させる。循環研磨用通路部 235 に、循環研磨用カウントセンサ（図示せず）が設けられる。循環研磨用カウントセンサは、例えば光学センサ等を用いて構成され、循環研磨用通路部 235 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。循環研磨用通路部 235 の上流端（遊技球収容部 103 の流出口の部分）に、循環研磨用通路部 235 を開閉可能な循環研磨用シャッター（図示せず）が設けられる。

20

【0094】

循環研磨用シャッター（図示せず）は、アウト口通路シャッター 161 と同様に構成される。但し、特定の契機、例えば、遊技が行われない状態が所定時間以上経過したときや、電源断の状態から復帰するときに、循環研磨用シャッターは、循環研磨用通路部 235 を開通して、遊技球収容部 103 に収容された遊技球が循環研磨用通路部 235 に流出することを可能にする。一方、上述した特定の契機以外のときに、循環研磨用シャッターは、循環研磨用通路部 235 を不通にして、遊技球収容部 103 に収容された遊技球が循環研磨用通路部 235 に流出することを規制する。

【0095】

この変形例において、遊技領域 PA1 を転動流下する遊技球が、各種入賞装置 31 ~ 35 のいずれかの入賞口 38 に入球すると、遊技盤 20 の貫通孔（図示せず）を通過して遊技盤 20 の後面側に達し、上述の第 1 実施形態と同様に、入賞口回収通路部 122 を流下する。遊技領域 PA1 を転動流下する遊技球が、各種入賞装置 31 ~ 35 の入賞口 38 に入球できずに、アウト口 39 に流入すると、遊技盤 20 の貫通孔（図示せず）を通過して遊技盤 20 の後面側に達し、上述の第 1 実施形態と同様に、アウト口回収通路部 121 を流下する。アウト口回収通路部 121 もしくは入賞口回収通路部 122 を通過した遊技球は、上述の第 1 実施形態と同様に、第 1 遊技済球循環通路部 123 を流下し、研磨通路切替部 109 に達する。

30

【0096】

研磨通路切替部 109 は、上述の第 1 実施形態と同様に、第 1 遊技済球循環通路部 123 を流下して研磨通路切替部 109 に達した遊技球を、戻り通路部 124 と第 2 遊技済球循環通路部 125 のうちいずれか一方へ選択的に導く。研磨通路切替部 109 により第 2 遊技済球循環通路部 125 へ導かれた遊技球は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下して研磨部 202 に達する。研磨前カウントセンサ 143 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、研磨前カウントセンサ 143 から入力される検出信号に基づいて、研磨部 202 に流入する遊技球の数をカウントすることができる。

40

【0097】

研磨部 202 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 から流入する遊技球を研磨（洗浄）して研磨後流入通路部 226 に送る。研磨部 202 により研磨された遊技球は、研磨後流入

50

通路部 226 を流下してファール球収容部 104 の内部に流入する。研磨後流入カウントセンサ 244 は、研磨後流入通路部 226 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、研磨後流入カウントセンサ 244 から入力される検出信号に基づいて、各種入賞装置 31～35 の入賞口 38 に入球するかアウト口 39 を通過し、研磨部 202 により研磨されてファール球収容部 104 に一時的に収容される遊技球の数をカウントすることができる。

【0098】

また、主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、研磨後流入カウントセンサ 244 から入力される検出信号に基づいて、研磨部 202 から流出する遊技球の数をカウントすることができる。このように、研磨前カウントセンサ 143 を用いて研磨部 202 に流入する遊技球の数をカウントし、研磨後流入カウントセンサ 244 を用いて研磨部 202 から流出する遊技球の数をカウントすることで、研磨部 202 に滞留する遊技球の数や、研磨部 202 に滞留する遊技球の滞留時間等を検知することができる。そのため、研磨部 202 における遊技球の詰まりや故障等のトラブルを早期に発見することが可能になる。

【0099】

上述の第 1 実施形態と同様に、ファール球回収口 111 に落入した遊技球は、ファール球回収通路部 131 を流下してファール球収容部 104 の内部に流入する。ファール球流入カウントセンサ 151 は、ファール球回収通路部 131 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、ファール球流入カウントセンサ 151 から入力される検出信号に基づいて、ファール球回収口 111 に落入し、ファール球収容部 104 に一時的に収容される遊技球の数をカウントすることができる。

【0100】

ファール球収容部 104 に一時的に収容された遊技球は、ファール球循環通路部 132 に流出する。ファール球収容部 104 の内部から流出した遊技球は、ファール球循環通路部 132 を流下して移送装置 105 に達する。移送前カウントセンサ 152 は、ファール球循環通路部 132 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、移送前カウントセンサ 152 から入力される検出信号に基づいて、ファール球収容部 104 の内部から流出する遊技球の数をカウントすることができる。

【0101】

移送装置 105 は、ファール球循環通路部 132 から流入する遊技球を、ファール球循環通路部 132 よりも上方に配置された移送後流入通路部 133 まで上昇させて送る。移送装置 105 から送られた遊技球は、移送後流入通路部 133 を流下して遊技球収容部 103 の内部に流入する。移送後流入カウントセンサ 153 は、移送後流入通路部 133 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、移送後流入カウントセンサ 153 から入力される検出信号に基づいて、各種入賞装置 31～35 の入賞口 38 に入球するかアウト口 39 を通過し、もしくはファール球回収口 111 に落入して、移送装置 105 により送られて遊技球収容部 103 に戻る遊技球の数をカウントすることができる。

【0102】

上記の変形例では、各種入賞装置 31～35 の入賞口 38 に入球するかアウト口 39 を通過した遊技球は、研磨部 202 により研磨されてファール球収容部 104 に一時的に収容され、移送装置 105 により送られて遊技球収容部 103 に戻る。ファール球回収口 111 に落入した遊技球は、ファール球収容部 104 に一時的に収容され、移送装置 105 により送られて遊技球収容部 103 に戻る。このように、研磨部 202 が遊技球収容部 103 よりも下側に配置される場合であっても、移送装置 105 がファール球収容部 104 に収容された遊技球のみを遊技球収容部 103 に送るように構成されるため、移送装置 105 の構造を単純にすることができ、移送装置 105 を小さくすることが可能になる。そのため、封入循環式のぱちんこ遊技機において、ぱちんこ遊技機の下部（遊技補助領域 2

10

20

30

40

50

00)における内部空間を簡素化して小さくすることができる。

【0103】

なお、主制御基板の遊技球管理手段(図示せず)が、発射球カウントセンサ145を用いて遊技球収容部103の内部から流出する遊技球の数をカウントし、アウト口カウントセンサ141、入賞口カウントセンサ142、および移送後流入カウントセンサ153を用いて遊技球収容部103の内部に流入する遊技球の数をカウントすることで、遊技球収容部103に収容され得る、すなわち、ぱちんこ遊技機PM1の各通路部を循環する遊技球の数を検知することができる。

【0104】

主制御基板の遊技球管理手段(図示せず)が、ファール球流入カウントセンサ151および研磨後流入カウントセンサ244を用いてファール球収容部104の内部に流入する遊技球の数をカウントし、移送前カウントセンサ152を用いてファール球収容部104の内部から流出する遊技球の数をカウントすることで、ファール球収容部104に一時的に収容される遊技球の数を検知することができる。これにより、移送装置105は、遊技球がファール球循環通路部132を流下してファール球収容部104に収容されたことをファール球流入カウントセンサ151が検出するか、遊技球が研磨後流入通路部226を流下してファール球収容部104に収容されたことを研磨後流入カウントセンサ244が検出すると作動を開始し、ファール球収容部104から遊技球が無くなってから所定時間が経過すると、その作動を停止するようになっている。そのため、移送装置105を適切なタイミングでのみ作動させることができるため、移送装置105の作動時間を低減させて、ぱちんこ遊技機の省電力化および低騒音化を図ることが可能になる。また、移送装置105の故障を抑えることも期待できる。

【0105】

また、特定の契機(例えば、遊技が行われない状態が所定時間以上経過したときや、電源断の状態から復帰するとき)に、循環研磨用シャッター(図示せず)は、所定の循環研磨時間が経過するまでの間だけ、循環研磨用通路部235を開通して、遊技球収容部103に収容された遊技球が循環研磨用通路部235に流出することを可能にする。一方、上述した特定の契機以外のときに、循環研磨用シャッターは、循環研磨用通路部235を不通にして、遊技球収容部103に収容された遊技球が循環研磨用通路部235に流出することを規制する。なお、循環研磨用シャッターは、循環研磨用通路部235を開通する際、特別遊技状態(大当り遊技状態)になると、循環研磨用通路部235を開通することを中止して不通にするようにしてもよい。

【0106】

循環研磨用シャッター(図示せず)により循環研磨用通路部235が開通されて、遊技球収容部103の内部から流出した遊技球は、循環研磨用通路部235を流下して研磨部202に達する。循環研磨用カウントセンサ(図示せず)は、循環研磨用通路部235を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板(図示せず)へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段(図示せず)は、循環研磨用カウントセンサから入力される検出信号に基づいて、研磨部202に流入する遊技球の数をカウントすることができる。

【0107】

研磨部202は、第2遊技済球循環通路部125から流入する遊技球を研磨(洗浄)して研磨後流入通路部226に送る。研磨部202により研磨された遊技球は、研磨後流入通路部226を流下してファール球収容部104の内部に流入する。研磨後流入カウントセンサ244は、研磨後流入通路部226を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板(図示せず)へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段(図示せず)は、研磨後流入カウントセンサ244から入力される検出信号に基づいて、遊技球収容部103の内部から循環研磨用通路部235へ流出し、研磨部202により研磨されてファール球収容部104に一時的に収容される遊技球の数をカウントすることができる。

【0108】

ファール球収容部104に一時的に収容された遊技球は、ファール球循環通路部132

10

20

30

40

50

に流出する。ファール球収容部 104 の内部から流出した遊技球は、ファール球循環通路部 132 を流下して移送装置 105 に達する。移送前カウントセンサ 152 は、ファール球循環通路部 132 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、移送前カウントセンサ 152 から入力される検出信号に基づいて、ファール球収容部 104 の内部から流出する遊技球の数をカウントすることができる。

【0109】

移送装置 105 は、ファール球循環通路部 132 から流入する遊技球を、ファール球循環通路部 132 よりも上方に配置された移送後流入通路部 133 まで上昇させて送る。移送装置 105 から送られた遊技球は、移送後流入通路部 133 を流下して遊技球収容部 103 の内部に流入する。移送後流入カウントセンサ 153 は、移送後流入通路部 133 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、移送後流入カウントセンサ 153 から入力される検出信号に基づいて、遊技球収容部 103 の内部から循環研磨用通路部 235 へ流出し、移送装置 105 により送られて遊技球収容部 103 に戻る遊技球の数をカウントすることができる。

10

【0110】

以上で説明したように、研磨部 202 が、遊技補助領域 200 における遊技球収容部 103 よりも下側に配置されることで、例えば、循環研磨用通路部 235 を設けることができる等、ぱちんこ遊技機の設計の自由度を高めることができる。また例えば、発射機構 101 とアウト口 39 との高さ方向の間隔が小さい場合に、遊技球収容部 103 よりも上側に研磨部 202 を配置する必要がないため、遊技球収容部 103 の設置スペースを容易に確保することができる。また、研磨部 202 と遊技球収容部 103 との間隔を広げることができるため、研磨部 202 の作動時に発生する振動を遊技球収容部 103 に伝わりにくくすることが可能になり、遊技球収容部 103 から発射機構 101（球送り機構 116）に向けて遊技球を安定して流下させることができる。

20

【0111】

また、上記の変形例では、以上で述べた効果に限らず、上述の第 1 実施形態と同様の効果を得ることが可能である。例えば、第 1 遊技済球循環通路部 123 の下流端に研磨通路切替部 109 が設けられているため、研磨部 202 が異常等により作動していなくても、遊技球を滞留させることなく遊技球収容部 103 へ戻すことができる。また、発射機構 101 により打ち出される遊技球が欠かせない特別遊技状態のときに、遊技球を短時間で遊技球収容部 103 へ戻すことができる。また、研磨部 202 による遊技球の研磨（洗浄）を適切なタイミングでのみ行うことができるため、研磨部 202 の作動時間を低減させて、ぱちんこ遊技機の省電力化および低騒音化を図ることが可能になる。

30

【0112】

また例えば、上述の第 1 実施形態と同様に、ぱちんこ遊技機が、電源オンの状態から一時的に電源オフの状態となり、再び電源オンの状態になっても、遊技球収容部 103 に收容され得る、すなわち、ぱちんこ遊技機の各通路部を循環する遊技球の数を、ぱちんこ遊技機が電源オフになる前の状態から継続的に検知することができる。また、研磨部 202 に滞留する遊技球の数や、ファール球収容部 104 に一時的に收容される遊技球の数を、ぱちんこ遊技機が電源オフになる前の状態から継続的に検知することができる。

40

【0113】

ぱちんこ遊技機が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、研磨前シャッター 163 は、第 2 遊技済球循環通路部 125 を不通にして、第 2 遊技済球循環通路部 125 を流下する遊技球が研磨前カウントセンサ 143 を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機を輸送する際に、第 2 遊技済球循環通路部 125 に残留していた遊技球が研磨部 202 に流入することに起因して、研磨部 202 の内部が破損することを防止することができる。

【0114】

50

ぱちんこ遊技機が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、移送後流入シャッター１７３は、移送後流入通路部１３３を不通にして、移送後流入通路部１３３を流下する遊技球が移送後流入カウントセンサ１５３を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機を輸送する際に、移送後流入通路部１３３に残留していた遊技球が遊技球収容部１０３に流入することに起因して、遊技球収容部１０３の内部が破損することを防止することができる。

【０１１５】

ぱちんこ遊技機が電源オンの状態から電源オフの状態になる場合、研磨後流入シャッター２６４は、研磨後流入通路部２２６を不通にして、研磨後流入通路部２２６を流下する遊技球が研磨後流入カウントセンサ２４４を通過することを規制する。ファール球流入シャッター１７１は、ファール球回収通路部１３１を不通にして、ファール球回収通路部１３１を流下する遊技球がファール球流入カウントセンサ１５１を通過することを規制する。これにより、ぱちんこ遊技機を輸送する際に、研磨後流入通路部２２６またはファール球回収通路部１３１に残留していた遊技球がファール球収容部１０４に流入することに起因して、ファール球収容部１０４の内部が破損することを防止することができる。

10

【０１１６】

上述の第１実施形態において、前枠２が、外枠１の前側開口部に対して開閉可能に取り付けられているが、これに限られるものではない。例えば、前枠２が、箱状に形成された筐体の前側開口部に対して開閉可能に取り付けられ、前枠２の後側が全体的に筐体に覆われるようにしてもよい。

20

【０１１７】

上述の第１実施形態において、遊技球は、オーステナイト系ステンレスを用いて形成されているが、これに限られるものではない。例えば、遊技球は、従来の遊技球と同様、鋼材を用いて形成されてもよい。この場合、磁性体の遊技球を用いることになるため、第１遊技済球循環通路部１２３に、磁性体受容部１２３aおよび磁性体除去部１０６や、磁性体通路切替部１０８を設けなくてもよい。

【０１１８】

上述の第１実施形態において、第１遊技済球循環通路部１２３と第２遊技済球循環通路部１２５との間に、研磨通路切替部１０９が設けられているが、これに限られるものではない。例えば、研磨通路切替部１０９および戻り通路部１２４を設けずに、第１遊技済球循環通路部１２３の下流端に達した全ての遊技球が、第２遊技済球循環通路部１２５を流下して研磨部１０２に達するようにしてもよい。

30

【０１１９】

上述の第１実施形態において、遊技球収容部１０３は、密閉型のタンク状に形成されているが、これに限られるものではなく、例えば、遊技球を１列で流下させることが可能なダクト状に形成されてもよい。ファール球収容部１０４も、密閉型のタンク状に形成されているが、これに限られるものではなく、例えば、遊技球を１列で流下させることが可能なダクト状に形成されてもよい。

【０１２０】

上述の第１実施形態において、研磨部１０２と遊技球収容部１０３とが別体に設けられているが、これに限られるものではない。例えば、研磨部と遊技球収容部とが一体的に形成されもよい。この場合、研磨部と遊技球収容部とに加えて研磨通路切替部が一体的に形成されるようにしてもよい。

40

【０１２１】

上述の第１実施形態において、ぱちんこ遊技機ＰＭ１の初期設定時に、遊技球を外部からアウト口３９に流入させて遊技球収容部１０３に補給することを例示したが、これに限られるものではない。例えば、ぱちんこ遊技機ＰＭ１の初期設定時に、遊技球を外部から各種入賞装置３１～３５のいずれかの入賞口３８に入球させて遊技球収容部１０３に補給するようにしてもよい。また、ぱちんこ遊技機ＰＭ１が電源オフの状態のときに、遊技球を外部からアウト口３９に流入（または入賞口３８に入球）させた場合、アウト口３９を

50

通過（または入賞口 38 に入球）した遊技球をぱちんこ遊技機 P M 1 の外部に排出する排出手段が設けられてもよい。

【 0 1 2 2 】

上述の第 1 実施形態において、遊技球管理手段（図示せず）は、主制御基板（図示せず）に設けられているが、これに限られるものではなく、例えば、副制御基板（図示せず）に設けられるようにしてもよい。

【 0 1 2 3 】

上述の第 1 実施形態において、ぱちんこ遊技機 P M 1 に隣接してカードユニット C U 1 が併設されているが、これに限られるものではない。例えば、カードユニット C U 1 が、ぱちんこ遊技機 P M 1 に一体的に設けられるようにしてもよい。また、カードユニット C U 1 の球貸しボタン R N 1 が、カードユニット C U 1 ではなく、ぱちんこ遊技機 P M 1 に設けられてもよい。

【 0 1 2 4 】

[第 2 実施形態]

弾球遊技機の第 2 実施形態について説明する。参考の実施形態として、第 2 実施形態に係る弾球遊技機を適用した封入循環式のぱちんこ遊技機（管理遊技機）P M 2 を図 1 1 および図 1 3 に示すとともに、このぱちんこ遊技機 P M 2 に設けられる遊技盤 5 2 0 を図 1 2 に示しており、まず、これらの図を参照してぱちんこ遊技機 P M 2 の全体構成について説明する。なお、以降の説明においては、便宜上、図 1 1 の各矢印で示す方向をそれぞれ、前後方向、左右方向、上下方向と称して説明する。

【 0 1 2 5 】

[遊技機の全体構成]

封入循環式のぱちんこ遊技機 P M 2 は、図 1 1 に示すように、外郭方形枠サイズに構成された縦向きの固定保持枠をなす外枠 5 0 1 と、これに合わせた方形枠サイズに構成されて開閉搭載枠をなす前枠 5 0 2 とを主体に構成される。前枠 5 0 2 は、外枠 5 0 1 および前枠 5 0 2 の左側縁部に配設された上下のヒンジ機構 5 0 3 a , 5 0 3 b により、外枠 5 0 1 の前側開口部に対して横開き開閉および着脱が可能に取り付けられる。また、前枠 5 0 2 は、右側縁部に設けられたダブル錠と称される施錠装置 5 0 4 を利用して、常には外枠 5 0 1 と係合連結された閉鎖状態に保持される。

【 0 1 2 6 】

前枠 5 0 2 には、この前枠 5 0 2 の上部前面域に合わせた方形状のガラス枠 5 0 5 が上下のヒンジ機構 5 0 3 a , 5 0 3 b を利用して横開き開閉および着脱可能に組み付けられる。ガラス枠 5 0 5 は、上述の施錠装置 5 0 4 を利用して、常には前枠 5 0 2 の前面を覆う閉鎖状態に保持される。前枠 5 0 2 の前面側には、遊技盤 5 2 0 が着脱可能にセット保持され、常には閉鎖保持されるガラス枠 5 0 5 の複層ガラス 5 0 5 a を通して遊技盤 5 2 0 の正面の遊技領域 P A 2 を視認可能に臨ませるようになっている。

【 0 1 2 7 】

ガラス枠 5 0 5 の上部には、遊技の展開状況に応じて発光する演出ランプ 5 0 7 や、遊技の展開状況に応じて効果音を発生させるスピーカ 5 0 8 が設けられている。ガラス枠 5 0 5 の下部には、複層ガラス 5 0 5 a よりも前方に突出して膨らむ膨出部 5 1 6（図 1 4 も参照）が形成され、この膨出部 5 1 6 の中央に、所定の演出操作を行うためのボタンやスイッチ、ダイヤル等の演出ボタンユニット 5 1 1 が取り付けられる。

【 0 1 2 8 】

前枠 5 0 2 の右下部には、遊技球の発射操作を行う発射ハンドル 5 0 9 が設けられている。前枠 5 0 2 の下部におけるガラス枠 5 0 5 の後側の領域には、遊技球を遊技領域 P A 2 へ向けて打ち出す発射機構 6 0 1 等が設けられる遊技補助領域 6 0 0（図 1 6 を参照）が形成されている。なお、遊技補助領域 6 0 0 の詳細については後述する。

【 0 1 2 9 】

遊技盤 5 2 0 は、図 1 2 に示すように、板状のベース部材 5 2 1 と、ベース部材 5 2 1 の前面側に取り付けられた内レール部材 5 2 2 および外レール部材 5 2 3 とを有している

。ベース部材 5 2 1 の前面に、左側の領域が内レール部材 5 2 2 に囲まれるとともに、上側および右側の領域が外レール部材 5 2 3 に囲まれた遊技領域 P A 2 が形成される。内レール部材 5 2 2 と外レール部材 5 2 3 との間に、発射機構 6 0 1 が設けられる側から遊技領域 P A 2 の上部へと繋がる発射通路 5 2 4 が形成される。遊技領域 P A 2 には、複数の釘 5 2 5 や風車 5 2 6 とともに、第 1 始動入賞装置 5 3 1、第 2 始動入賞装置 5 3 2、左側一般入賞装置 5 3 3、右側一般入賞装置 5 3 4、大入賞装置 5 3 5 等の各種入賞装置や、作動ゲート装置 5 3 6 が配設されている。また、遊技領域 P A 2 の略中央にセンター飾り 5 2 7 が配設される。ベース部材 5 2 1 の後面側に、画像表示装置 5 2 8 および上下の可動演出装置 5 2 9、5 3 0 等が取り付けられ、センター飾り 5 2 7 の開口部分を通じて、画像表示装置 5 2 8 の画面および上下の可動演出装置 5 2 9、5 3 0 の前面側を前方から視認可能に構成されている。

10

【 0 1 3 0 】

遊技領域 P A 2 の下端部には、各種入賞装置 5 3 1 ~ 5 3 5 の入賞口に入球せずに流下した遊技球が通過可能なアウト口 5 3 9 が設けられている。各種入賞装置 5 3 1 ~ 5 3 5 の入賞口に入球した遊技球又はアウト口 5 3 9 に流入した遊技球は、遊技盤 5 2 0 に前後貫通して形成された貫通孔（図示せず）を通じて遊技盤 5 2 0 の後面側へ流下し、さらに前枠 5 0 2 の下部の遊技済球回収通路部 6 0 5（図 1 6 を参照）を流下して、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。

【 0 1 3 1 】

続いて、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後面側の基本構造を説明する。図 1 3 に示すように、前枠 5 0 2 の後面側には、中央に前後連通する窓口を有して前枠 5 0 2 よりも幾分小型の矩形枠状に形成された裏機構盤 5 4 0 が取り付けられている。裏機構盤 5 4 0 の各部には、遊技施設側から供給される遊技球を貯留するタンク部材 5 4 3、タンク部材 5 4 3 から供給される遊技球を流下させる樋部材 5 4 4、樋部材 5 4 4 を流下する遊技球を払い出す払出ユニット 5 4 5、払出ユニット 5 4 5 から払い出された遊技球を発射通路部 6 0 4（図 1 6 を参照）へ流下させる裏側通路部材 5 4 6 等が設けられている。また、裏機構盤 5 4 0 には、遊技盤 5 2 0 の後側を全体的に覆う遊技盤カバー 5 4 9 が取り付けられる。

20

【 0 1 3 2 】

遊技盤 5 2 0 の後側には、ぱちんこ遊技機 P M 2 の作動を統括的に制御する主制御基板（図示せず）や、遊技展開に応じた画像表示、効果照明、効果音等の演出全般の制御を行う副制御基板（図示せず）等が取り付けられている。これに対して、裏機構盤 5 4 0 の後側には、遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御基板 5 5 2 や、遊技施設側から受電して各種制御装置や電気・電子部品に電力を供給する電源基板 5 5 3 等が取り付けられている。これらの制御装置とぱちんこ遊技機 P M 2 各部の電気・電子部品とがハーネス（コネクタケーブル）で接続されて、ぱちんこ遊技機 P M 2 が作動可能に構成されている。

30

【 0 1 3 3 】

また、図 1 1 に示すように、ぱちんこ遊技機 P M 2 には、これに隣接してカードユニット C U 2 が併設されている。カードユニット C U 2 は、ぱちんこ遊技機 P M 2 と双方向通信可能に構成されており、プリペイドカードや会員カード（以下、単に「カード」とも称する）を受け付けて、該カードの記録情報により特定される遊技者保有の有価価値（カード残高）を遊技に使用可能な遊技球数（持球数）に変換して、遊技施設の遊技島（図示せず）とぱちんこ遊技機 P M 2 との間で遊技球を循環使用して遊技を行い得るようになっている。ぱちんこ遊技機 P M 2 では、遊技を行うのに必要な遊技価値（カード残高）は、カードユニット C U 2 および遊技機内に設けられた制御装置（遊技者の手で直接触れることが不可能な制御ソフト）による数値データのみによって管理される。カードユニット C U 2 には、現金たる紙幣を投入するための紙幣投入口 M N 2、会員カードやプリペイドカードを投入するためのカード投入口 C R 2、投入されたカードの読み取り・書き込み機能を有するカードリーダーライタ（図示せず）、カード残高を限度として球貸し動作を要求するための球貸しボタン R N 2 等が設けられている。

40

【 0 1 3 4 】

50

〔遊技補助領域の構成〕

次に、ガラス枠 5 0 5 の膨出部 5 1 6 および、この膨出部 5 1 6 に覆われる前枠 5 0 2 の遊技補助領域 6 0 0 について、図 1 4 ~ 図 1 6 を追加参照して説明する。膨出部 5 1 6 は、図 1 1 および図 1 4 に示すように、ガラス枠 5 0 5 の下部に、複層ガラス 5 0 5 a よりも前方に突出する半球状に形成される。前述したように、膨出部 5 1 6 の中央に、演出ボタンユニット 5 1 1 が取り付けられる。図 1 4 に示すように、膨出部 5 1 6 の上部における演出ボタンユニット 5 1 1 の周辺部に、水平面状に広がる平面部 5 1 7 が形成される。平面部 5 1 7 の右側に、演出に関する設定操作等を行うための十字キー 5 1 2 が設けられる。平面部 5 1 7 の左前側に、持球数に関する情報をカードに書き込む操作を行うための計数ボタン 5 1 3 が設けられる。計数ボタン 5 1 3 が操作されると、カードユニット C U 2 のカード投入口 C R 2 に投入されているカードに、遊技終了時（返却要求時）に確定した最終的な持球数が記憶され、このカード投入口 C R 2 から当該カードが排出される。

10

【0135】

平面部 5 1 7 の左後側に、持球数に関する情報を表示可能な遊技球数表示装置 5 1 4 が設けられる。遊技球数表示装置 5 1 4 は、持球数に関する情報を 7 セグメント表示するものである。遊技球数表示装置 5 1 4 は、6 桁の数字等を表示可能な 7 セグメント L E D を用いて構成される。持球数に関する情報として、例えば、持球数を示す 6 桁までの数字を、遊技球数表示装置 5 1 4 で表示することが可能である。また、図 1 5 に示すように、遊技球数表示装置 5 1 4 の表示面は、平面部 5 1 7 に対し傾斜して上前方を向くように配置される。これにより、遊技者は、遊技球数表示装置 5 1 4 の上前方から、遊技球数表示装置 5 1 4 に表示される持球数に関する情報を視認しやすくなる。

20

【0136】

図 1 6 に示すように、前枠 5 0 2 の下部における膨出部 5 1 6 の後側の領域には、膨出部 5 1 6 に覆われた比較的広い内部空間を形成する遊技補助領域 6 0 0 が形成される。この遊技補助領域 6 0 0 に、発射機構 6 0 1 と、球送り機構 6 1 6 と、発射通路部 6 0 3 とが設けられる。

【0137】

発射機構 6 0 1 は、遊技球を遊技領域 P A 2 へ向けて左上方に打ち出す。球送り機構 6 1 6 は、発射機構 6 0 1 の前側に重なって配置される。球送り機構 6 1 6 は、発射通路部 6 0 3 を流下する遊技球を 1 球ずつ発射機構 6 0 1 へ送る。球送り機構 6 1 6 と発射機構 6 0 1 との間に、球送りカウントセンサ 6 0 4 が設けられる。球送りカウントセンサ 6 0 4 は、球送り機構 6 1 6 から発射機構 6 0 1 へ送られる遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。発射通路部 6 0 3 は、払出ユニット 5 4 5 から払い出されて裏側通路部材 5 4 6 を流下した遊技球を球送り機構 6 1 6 へ流下させる。

30

【0138】

発射通路部 6 0 3 は、例えば、透明の樹脂材料を用いて密閉型のダクト状に形成され、遊技球が流下する発射通路部 6 0 3 の内部を外部側から視認することができるようになっている。また、球送り機構 6 1 6 と繋がる発射通路部 6 0 3 の下流端部近傍に、球抜き装置（図示せず）と、遊技球排出通路部（図示せず）とが設けられる。球抜き装置は、所定の操作によって、発射通路部 6 0 3 の内部で停留する遊技球を遊技球排出通路部に流出させることができるようになっている。球抜き装置により発射通路部 6 0 3 の内部から遊技球排出通路部に流出した遊技球は、遊技球排出通路部を通じて遊技補助領域 6 0 0 の後側へ流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。遊技球排出通路部に、遊技球排出センサ（図示せず）が設けられる。遊技球排出センサは、遊技球排出通路部を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。

40

【0139】

発射機構 6 0 1 と遊技盤 5 2 0 の外レール部材 5 2 3 との間に、発射機構 6 0 1 により打ち出されて遊技領域 P A 2 に達しなかった遊技球が落入するファール球回収口 6 1 1 が設けられる。ファール球回収口 6 1 1 に落入した遊技球は、ファール球回収通路部 6 1 2 を通じて遊技補助領域 6 0 0 の後側へ流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される

50

。ファール球排出通路部 6 1 2 に、ファール球カウントセンサ 6 1 3 が設けられる。ファール球カウントセンサ 6 1 3 は、ファール球排出通路部 6 1 2 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。

【0140】

前枠 5 0 2 の下部に位置する遊技補助領域 6 0 0 の後側に、遊技済球回収通路部 6 0 5 が設けられる。各種入賞装置 5 3 1 ~ 5 3 5 の入賞口に入球した遊技球又はアウト口 5 3 9 に流入した遊技球は、前述したように、遊技済球回収通路部 6 0 5 を流下して、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。遊技済球回収通路部 6 0 5 に、遊技済球カウントセンサ 6 0 6 が設けられる。遊技済球カウントセンサ 6 0 6 は、遊技済球回収通路部 6 0 5 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。

10

【0141】

以上のように構成される、封入循環式のぱちんこ遊技機 P M 2 は、外枠 5 0 1 が遊技施設の遊技島（図示せず）に固定設置され、前枠 5 0 2、ガラス枠 5 0 5 等が閉鎖施錠された状態で遊技に供され、必要に応じてカードユニット C U 2 の球貸しボタン R N 2 を押し操作した後、発射ハンドル 5 0 9 を回動操作することにより遊技が開始される。なお、本実施形態で使用される遊技島は、従来の遊技島と同様に構成され、ぱちんこ遊技機 P M 2 から排出された遊技球を回収する回収装置（図示せず）と、回収装置により回収された遊技球を研磨（洗浄）しつつ上昇させる研磨装置（図示せず）と、研磨装置により上昇した遊技球をぱちんこ遊技機 P M 2 のタンク部材 5 4 3 に補給する補給装置（図示せず）とを備えている。本実施形態で使用される遊技球も、従来の遊技球と同じ構成である。

20

【0142】

球貸しボタン R N 2 が操作されると、球貸しボタン R N 2 の操作信号がカードユニット C U 2 からぱちんこ遊技機 P M 2 に送信される。球貸しボタン R N 2 の操作信号がぱちんこ遊技機 P M 2 に送信されると、ぱちんこ遊技機 P M 2 の払出制御基板 5 5 2 は、払出ユニット 5 4 5 に払い出し信号を送信する。払出ユニット 5 4 5 は、払出制御基板 5 5 2 から送信された払い出し信号に応じて、樋部材 5 4 4 を流下する（もしくは、樋部材 5 4 4 における払出ユニット 5 4 5 の近傍で停留する）遊技球を裏側通路部材 5 4 6 へ払い出す。

【0143】

払出ユニット 5 4 5 から払い出された遊技球は、裏側通路部材 5 4 6 を流下して発射通路部 6 0 3 に達する。発射通路部 6 0 3 に達した遊技球は、発射通路部 6 0 3 を流下して球送り機構 6 1 6 の近傍で一時的に停留する。なお、払出ユニット 5 4 5 から払い出される遊技球の数は、遊技者が任意に設定することが可能である。また、払出ユニット 5 4 5 から払い出されて発射通路部 6 0 3 に流入可能な遊技球の数は、発射通路部 6 0 3 で遊技球の詰まり等が生じない流入上限数に予め設定されている。

30

【0144】

発射ハンドル 5 0 9 が回動操作されると、発射通路部 6 0 3 における球送り機構 6 1 6 の近傍で停留する遊技球が、球送り機構 6 1 6 によって 1 球ずつ発射機構 6 0 1 に送り出され、当該発射機構 6 0 1 により遊技領域 P A 2 に向けて打ち出される。このとき、球送りカウントセンサ 6 0 4 は、球送り機構 6 1 6 から発射機構 6 0 1 へ送られる遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板に設けられた遊技球管理手段（図示せず）は、球送りカウントセンサ 6 0 4 から入力される検出信号に基づいて、発射機構 6 0 1 により打ち出される遊技球の数をカウントすることができる。

40

【0145】

遊技領域 P A 2 を転動流下する遊技球が、各種入賞装置 5 3 1 ~ 5 3 5 のいずれかの入賞口に入球すると、遊技盤 5 2 0 の貫通孔（図示せず）を通過して遊技盤 5 2 0 の後面側に達する。遊技領域 P A 2 を転動流下する遊技球が、各種入賞装置 5 3 1 ~ 5 3 5 の入賞口に入球できずに、アウト口 5 3 9 に流入すると、遊技盤 5 2 0 の貫通孔（図示せず）を通過して遊技盤 5 2 0 の後面側に達する。各種入賞装置 5 3 1 ~ 5 3 5 の入賞口に入球するかアウト口 5 3 9 を通過して、遊技盤 5 2 0 の後面側に達した遊技球は、遊技済球回収

50

通路部 605 を流下して、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。遊技済球カウントセンサ 606 は、遊技済球回収通路部 605 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、遊技済球カウントセンサ 606 から入力される検出信号に基づいて、各種入賞装置 531 ~ 535 の入賞口に入球するかアウト口 539 を通過した遊技球の数をカウントすることができる。

【0146】

発射機構 601 により打ち出されて遊技領域 P A 2 に達しなかった遊技球は、ファール球回収口 611 に落入する。ファール球回収口 611 に落入した遊技球は、ファール球回収通路部 612 を流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。ファール球カウントセンサ 613 は、ファール球排出通路部 612 を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、ファール球カウントセンサ 613 から入力される検出信号に基づいて、ファール球回収口 611 に落入した遊技球の数をカウントすることができる。

10

【0147】

なお、球抜き装置（図示せず）の操作によって、発射通路部 603 の内部で停留する遊技球を遊技球排出通路部（図示せず）に流出させる場合がある。球抜き装置により発射通路部 603 の内部から流出した遊技球は、遊技球排出通路部を流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。遊技球排出センサ（図示せず）は、遊技球排出通路部を流下する遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、遊技球排出センサから入力される検出信号に基づいて、球抜き装置により発射通路部 603 の内部から流出した遊技球の数をカウントすることができる。

20

【0148】

ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出された遊技球は、遊技島（図示せず）の内部側で落下する。遊技島の回収装置（図示せず）は、ぱちんこ遊技機 P M 2 から排出された遊技球を回収する。遊技島の研磨装置（図示せず）は、回収装置により回収された遊技球を研磨（洗浄）しつつ上昇させる。遊技島の補給装置（図示せず）は、研磨装置により上昇した遊技球をぱちんこ遊技機 P M 2 のタンク部材 543 に補給する。タンク部材 543 に補給された遊技球は、樋部材 544 を流下し、払出ユニット 545 により払い出されると、裏側通路部材 546 を流下して発射通路部 603 へ戻る。

30

【0149】

以上で説明したように、各種入賞装置 531 ~ 535 の入賞口に入球するかアウト口 539 を通過して、遊技盤 520 の後面側に達した遊技球は、遊技済球回収通路部 605 を流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。ファール球回収口 611 に落入した遊技球は、ファール球回収通路部 612 を流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。なお、球抜き装置（図示せず）により発射通路部 603 の内部から流出した遊技球は、遊技球排出通路部（図示せず）を流下し、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出される。このように、本実施形態によれば、発射機構 601 により遊技領域 P A 2 に向けて打ち出される遊技球が、最終的に、ぱちんこ遊技機 P M 2 の後方へ排出されるように構成されるため、第 1 実施形態で説明したような移送装置を設ける必要がなくなる。そのため、封入循環式のぱちんこ遊技機 P M 2 の下部（遊技補助領域 600）における内部構造を簡素化することが可能になる。

40

【0150】

また、主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）が、球送りカウントセンサ 604 を用いて球送り機構 616 から発射機構 601 へ送られる遊技球の数をカウントすることで、発射通路部 603 に停留する遊技球の数、すなわち、発射機構 601 により打ち出すことが可能な遊技球の数を検知することができる。主制御基板の遊技球管理手段が、ファール球カウントセンサ 613 を用いてファール球回収口 611 に落入した遊技球の数をカウントすることで、ファール球回収口 611 に落入した遊技球の数に応じて、発射機構 601

50

により打ち出すことが可能な遊技球の数を加算調整することができる。主制御基板の遊技球管理手段が、遊技球排出センサ（図示せず）を用いて球抜き装置（図示せず）により発射通路部 603 の内部から流出した遊技球の数をカウントすることで、発射通路部 603 の内部から流出した遊技球の数に応じて、発射機構 601 により打ち出すことが可能な遊技球の数を加算調整することができる。主制御基板の遊技球管理手段で検知される、発射機構 601 により打ち出すことが可能な遊技球の数は、残球数として遊技球数表示装置 514 に表示される。

【0151】

なお、各種入賞装置 531 ~ 535 の内部に、各種入賞センサ（図示せず）が設けられている。各種入賞センサは、各種入賞装置 531 ~ 535 の入賞口に入球した遊技球を検出し、検出信号を主制御基板（図示せず）へ出力する。主制御基板の遊技球管理手段（図示せず）は、各種入賞センサから入力される検出信号に基づいて、カードの記録情報により特定される遊技者保有の有価価値（カード残高）に、例えば持球数を増加させる等の特典を付与する。そのため、各種入賞センサから検出信号が出力されても、払出制御基板 552 は、払出ユニット 545 に払い出し信号を送信しない。

【0152】

そこで、払出制御基板 552 が払い出し信号を送信可能なモードとして、手動球貸しモードと、自動球貸しモードとが設定される。手動球貸しモードでは、球貸しボタン RN2 から操作信号が送信される場合にのみ、払出制御基板 552 が払い出し信号を送信する。自動球貸しモードでは、球貸しボタン RN2 から操作信号が送信される場合に加え、（主制御基板の遊技球管理手段で検知される）発射機構 601 により打ち出すことが可能な遊技球の数が所定の残球数よりも少ない場合に、払出制御基板 552 が払い出し信号を送信する。そして、主制御基板は、通常の遊技状態の場合に手動補給モードに移行し、特別遊技状態（大当り遊技状態）の場合に自動補給モードに移行するように制御を行う。これにより、発射機構 101 により打ち出される遊技球が欠かせない特別遊技状態のときに、発射通路部 603 を流下する遊技球が不足するのを防止することができる。なお、主制御基板が手動補給モードと自動補給モードとにモード移行する制御を行うか否かを、遊技者が設定操作可能に構成されてもよい。

【0153】

〔第2実施形態における特徴構成〕

第2実施形態において、各種入賞装置 531 ~ 535 の入賞口に入球するかアウト口 539 を通過して、遊技盤 520 の後面側に達した遊技球は、遊技済球回収通路部 605 を流下し、ぱちんこ遊技機 PM2 の後方へ排出される。ファール球回収口 611 に落入した遊技球は、ファール球回収通路部 612 を流下し、ぱちんこ遊技機 PM2 の後方へ排出される。なお、球抜き装置（図示せず）により発射通路部 603 の内部から流出した遊技球は、遊技球排出通路部（図示せず）を流下し、ぱちんこ遊技機 PM2 の後方へ排出される。これにより、発射機構 601 により遊技領域 PA2 に向けて打ち出される遊技球が、最終的に、ぱちんこ遊技機 PM2 の後方へ排出されるように構成されるため、第1実施形態で説明したような移送装置を設ける必要がなくなる。そのため、封入循環式のぱちんこ遊技機 PM2 の下部（遊技補助領域 600）における内部構造を簡素化することが可能になる。

【0154】

上述の第2実施形態において、遊技球管理手段（図示せず）は、主制御基板（図示せず）に設けられているが、これに限られるものではなく、例えば、副制御基板（図示せず）に設けられるようにしてもよい。

【0155】

上述の第2実施形態において、ぱちんこ遊技機 PM2 に隣接してカードユニット CU2 が併設されているが、これに限られるものではない。例えば、カードユニット CU2 が、ぱちんこ遊技機 PM2 に一体的に設けられるようにしてもよい。また、カードユニット CU2 の球貸しボタン RN2 が、カードユニット CU2 ではなく、ぱちんこ遊技機 PM2 に

設けられてもよい。

【 0 1 5 6 】

上述の各実施形態において、封入循環式の弾球遊技機の一例として、ぱちんこ遊技機を例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、アレンジボール、雀球遊技機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることができる。

【 符号の説明 】

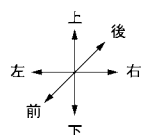
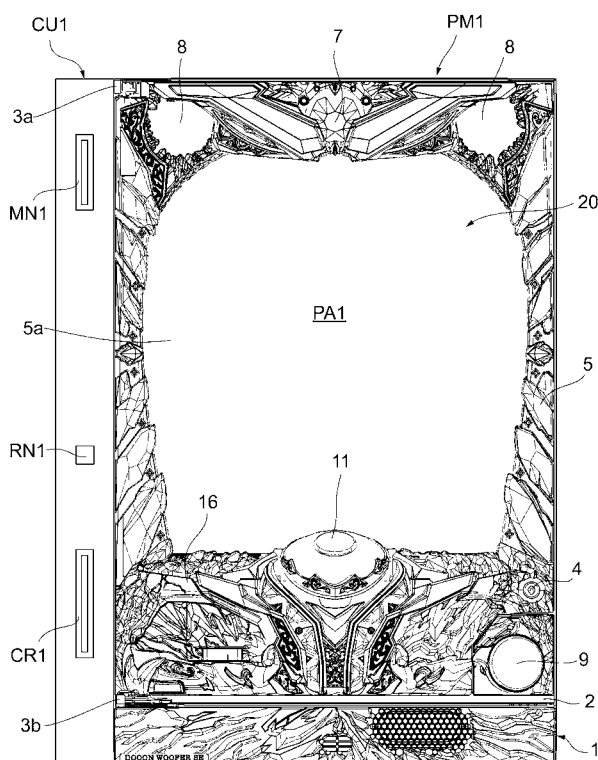
【 0 1 5 7 】

P M 1	ぱちんこ遊技機（弾球遊技機の第 1 実施形態）	
P A 1	遊技領域	
1	外枠	10
2	前枠	
2 0	遊技盤	
1 0 0	遊技補助領域	
1 0 1	発射機構	
1 0 2	研磨部	
1 0 3	遊技球収容部（ 1 0 3 w 視認窓）	
1 0 4	ファール球収容部	
1 0 5	移送装置	
1 1 1	ファール球回収口	
1 2 1	アウト口回収通路部	20
1 2 2	入賞口回収通路部	
1 2 3	第 1 遊技済球循環通路部 1 2 3（ 1 2 3 a 磁性体受容部）	
1 2 4	戻り通路部	
1 2 5	第 2 遊技済球循環通路部	
1 2 6	研磨後流入通路部	
1 2 7	球送り通路部	
1 3 1	ファール球回収通路部	
1 3 2	ファール球循環通路部	
1 3 3	移送後流入通路部	
1 4 1	アウト口カウントセンサ	30
1 4 2	入賞口カウントセンサ	
1 4 3	研磨前カウントセンサ	
1 4 4	研磨後流入カウントセンサ	
1 5 1	ファール球流入カウントセンサ	
1 5 2	移送前カウントセンサ	
1 5 3	移送後流入カウントセンサ	
1 6 1	アウト口通路シャッター	
1 6 2	入賞口通路シャッター	
1 6 3	研磨前シャッター	
1 6 4	研磨後流入シャッター	40
1 7 1	ファール球流入シャッター	
1 7 2	移送前シャッター	
1 7 3	移送後流入シャッター	
2 0 0	遊技補助領域（変形例）	
2 0 2	研磨部	
2 3 5	循環研磨用通路部	
2 4 4	研磨後流入カウントセンサ	
2 6 4	研磨後流入シャッター	
P M 2	ぱちんこ遊技機（弾球遊技機の第 2 実施形態）	
P A 2	遊技領域	50

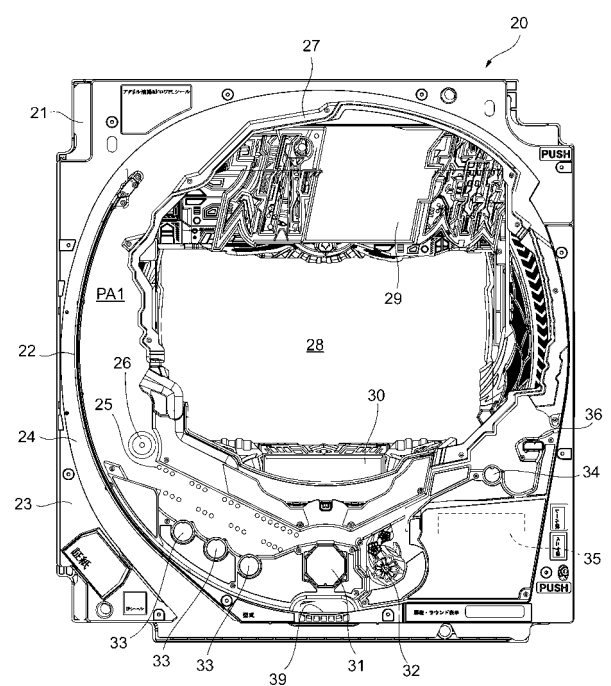
- | | |
|-------|------------------------|
| 5 0 1 | 外 枠 |
| 5 0 2 | 前 枠 |
| 5 2 0 | 遊 技 盤 |
| 6 0 0 | 遊 技 補 助 領 域 |
| 6 0 1 | 発 射 機 構 |
| 6 0 3 | 発 射 通 路 部 |
| 6 0 4 | 球 送 り カ ウ ン ト セ ン サ |
| 6 0 5 | 遊 技 済 球 回 収 通 路 部 |
| 6 0 6 | 遊 技 済 球 カ ウ ン ト セ ン サ |
| 6 1 1 | フ ァ ール 球 回 収 口 |
| 6 1 2 | フ ァ ール 球 排 出 通 路 部 |
| 6 1 3 | フ ァ ール 球 カ ウ ン ト セ ン サ |
| 6 1 6 | 球 送 り 機 構 |

10

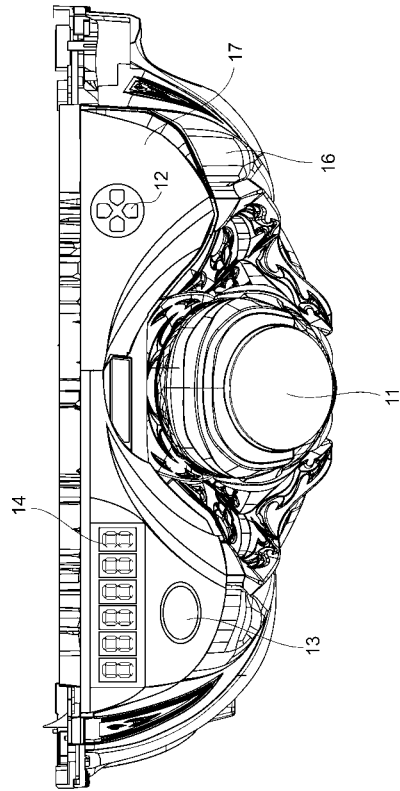
【 図 1 】



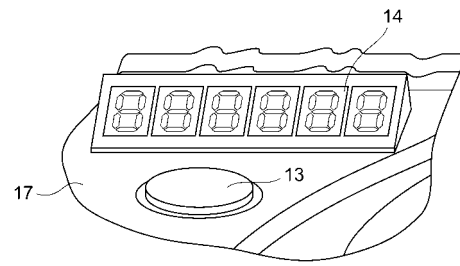
【圖 2】



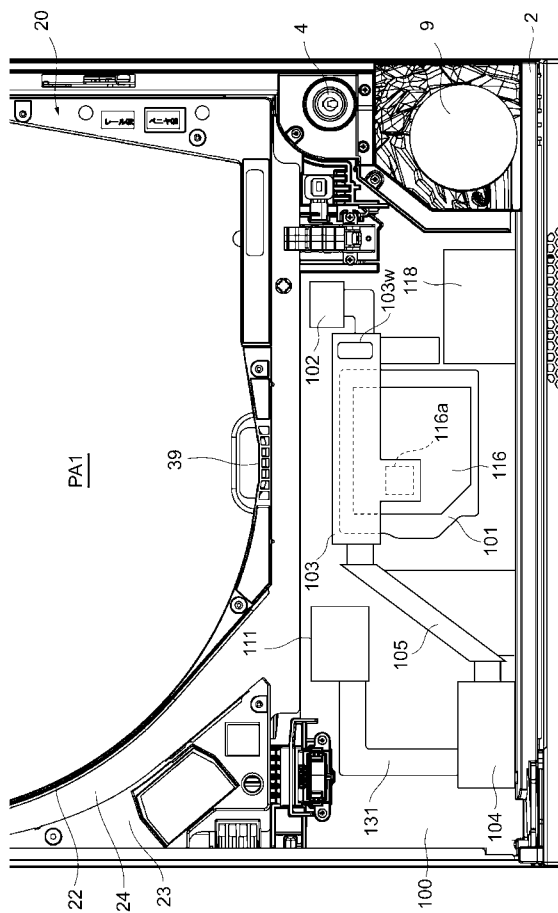
【図 3】



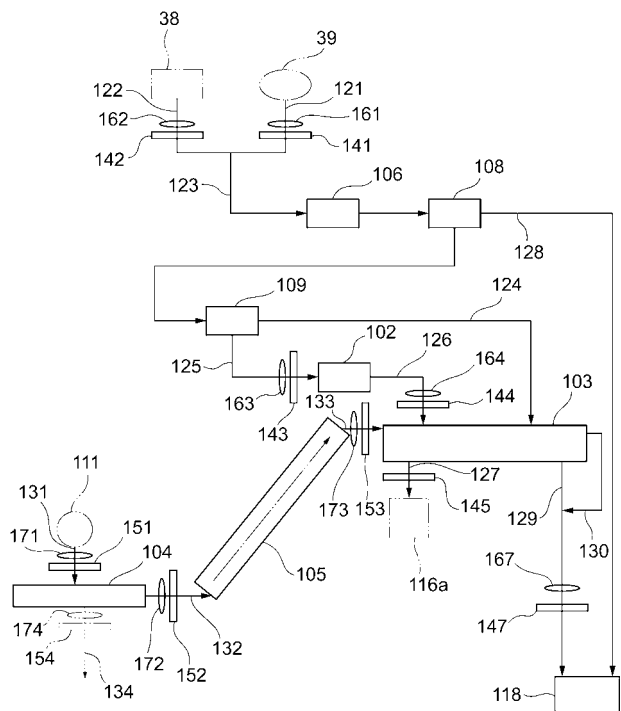
【図 4】



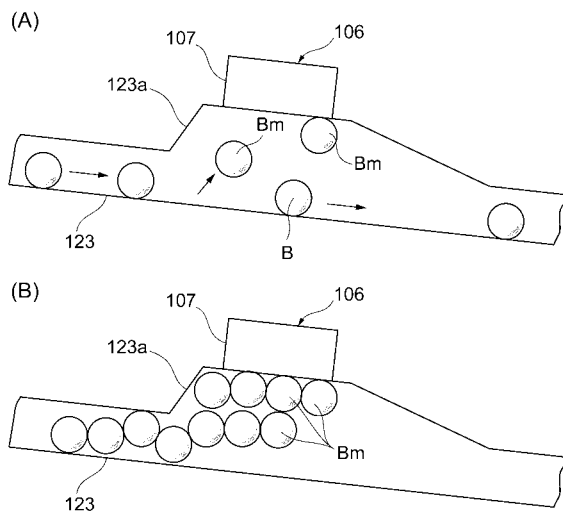
【図 5】



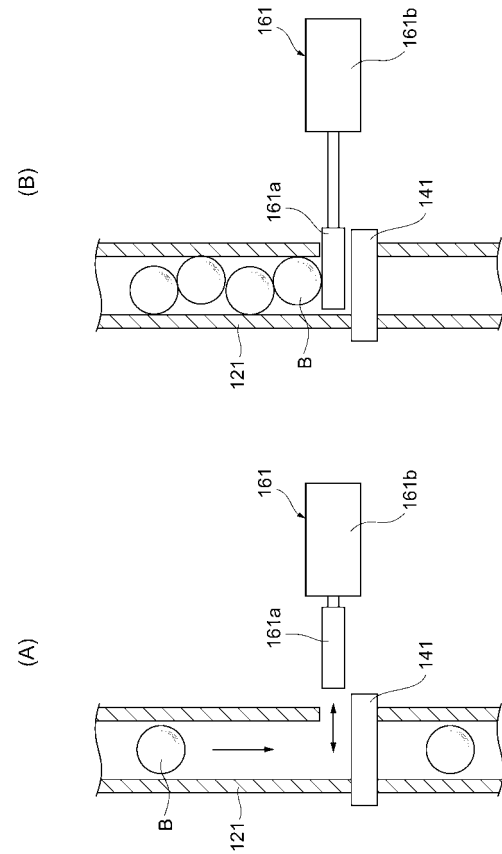
【図 6】



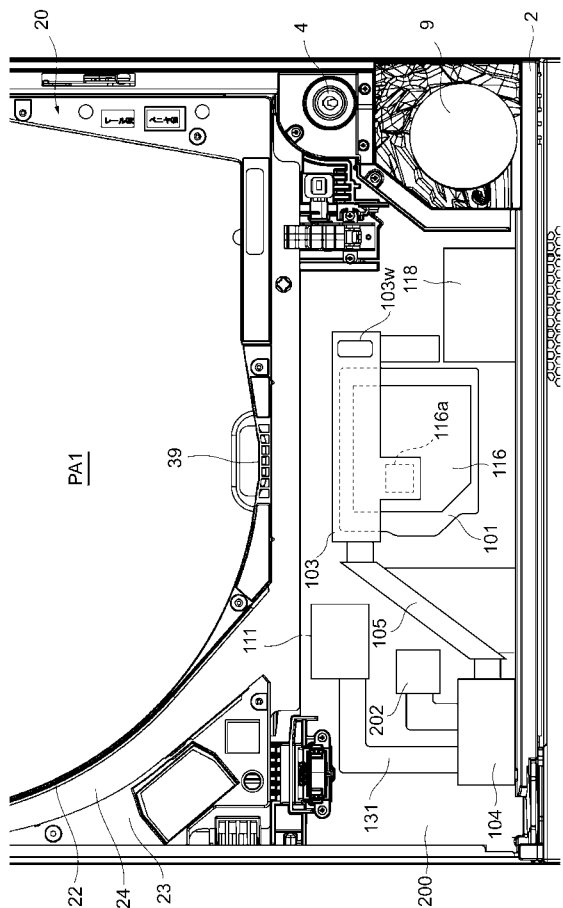
【図 7】



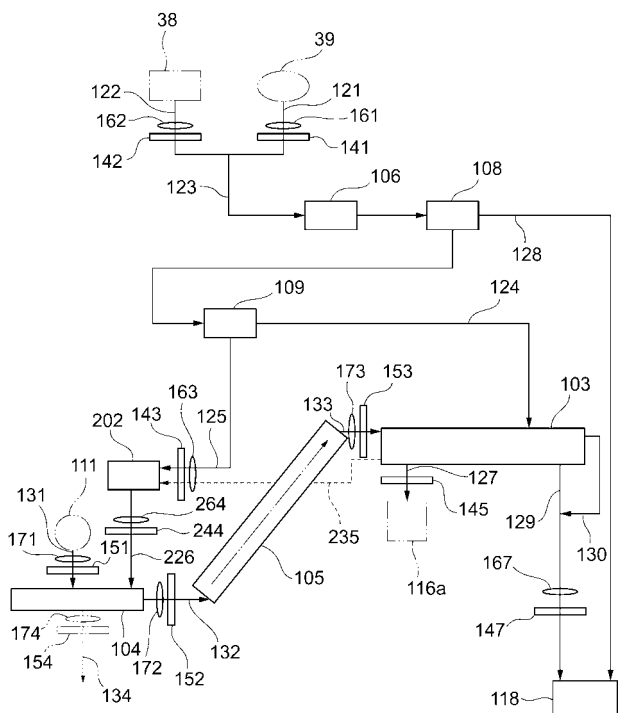
【図 8】



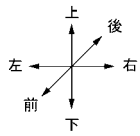
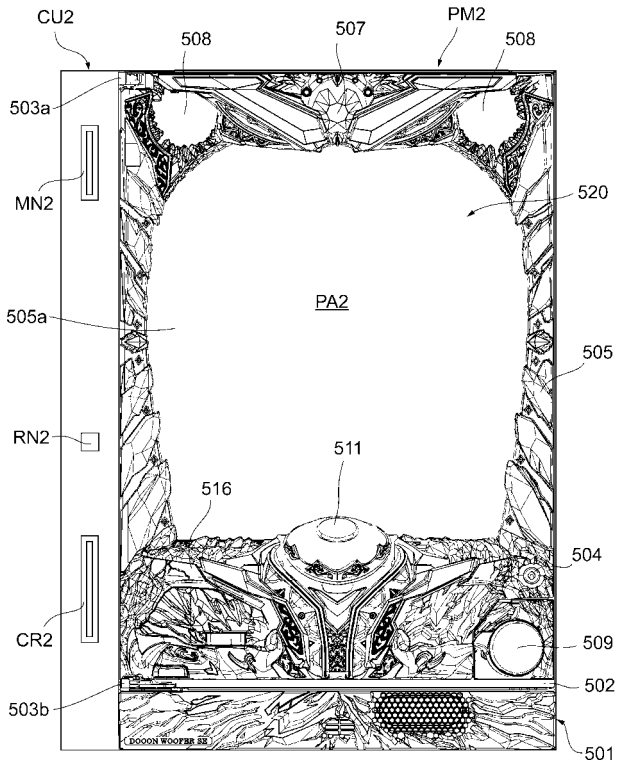
【図 9】



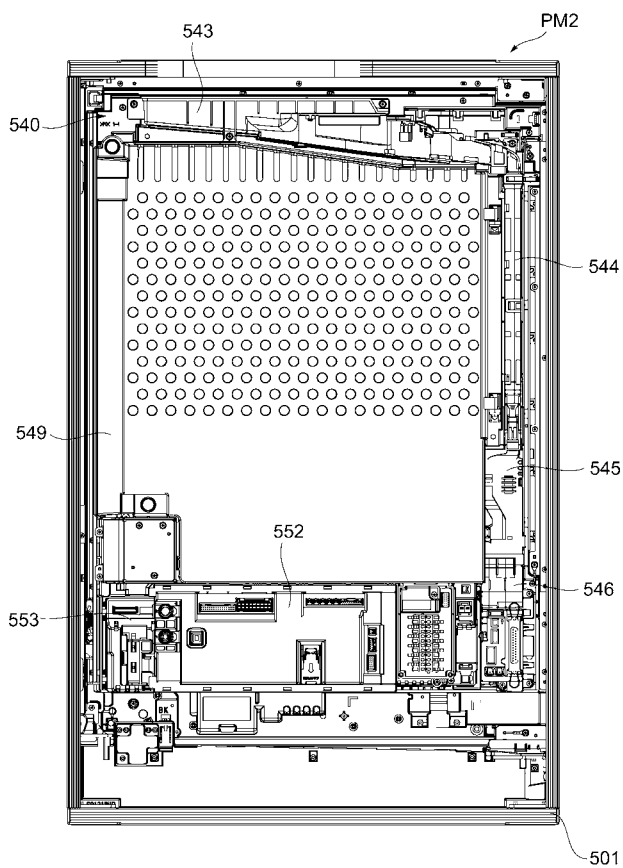
【図 10】



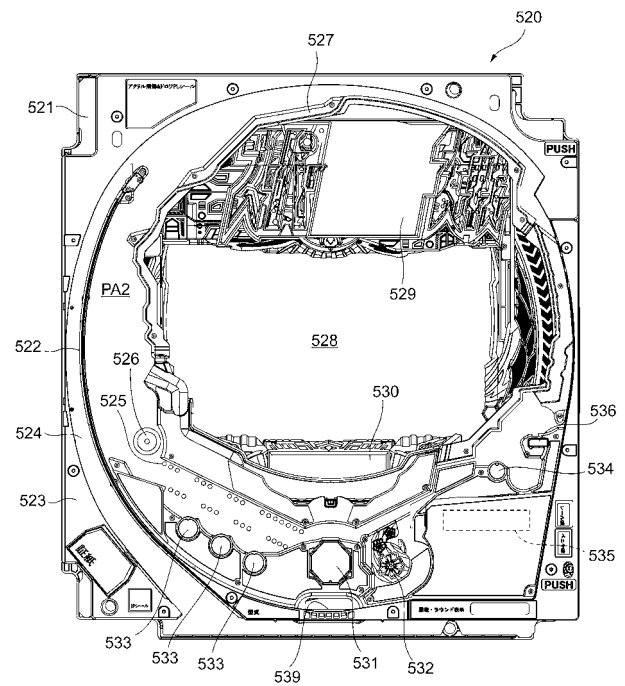
【図 1 1】



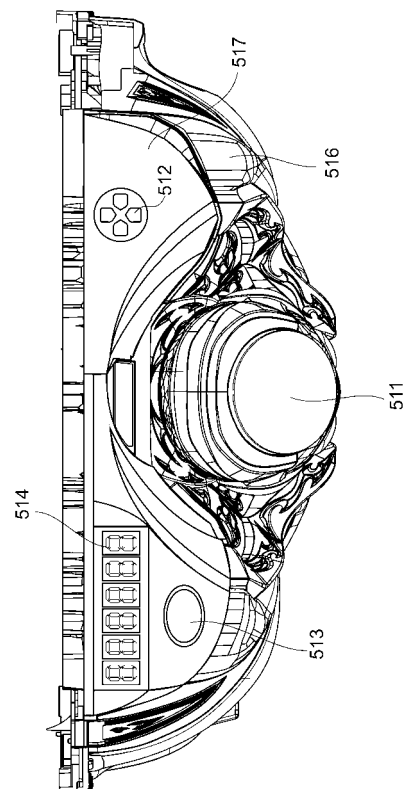
【図 1 3】



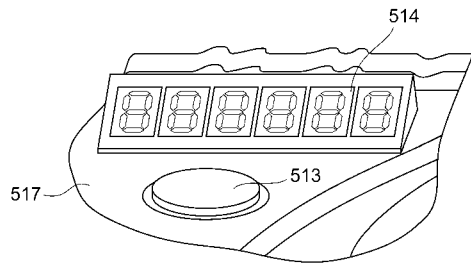
【図 1 2】



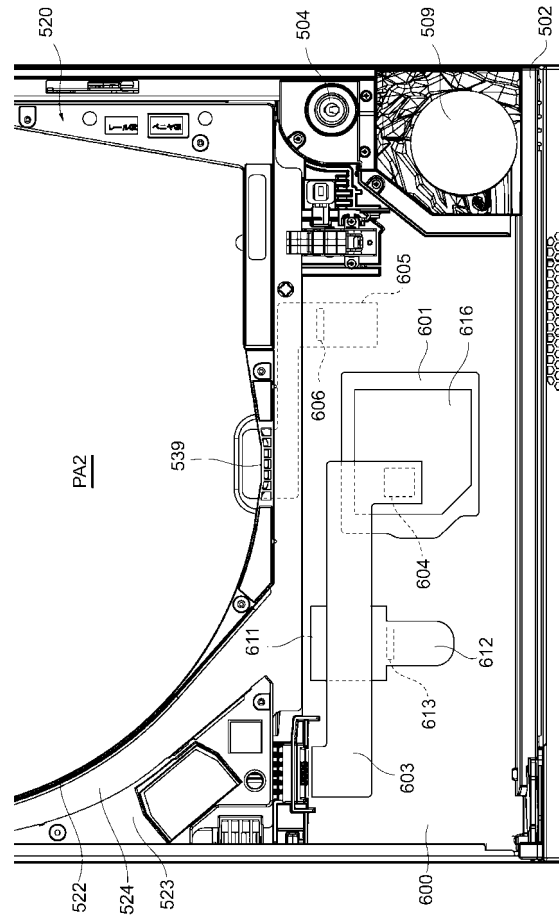
【図 1 4】



【図 15】



【図 16】



フロントページの続き

(72)発明者 山本 隼成

東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内

(72)発明者 近藤 孝志

東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内

(72)発明者 山田 陸史

東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内

Fターム(参考) 2C088 AA66 BA50 BA58 BA61 BA94 DA09 DA15 EA10 EA15 EA26